WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

C30B 11/00, 29/42

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/56954

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

28. September 2000 (28.09.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/02349

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. März 2000 (16.03.00)

(30) Prioritätsdaten:

199 12 484.1

19. März 1999 (19.03.99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): FREIBERGER COMPOUND MATERIALS GMBH [DE/DE]; Am Junger Löwe Schacht 5, D-09599 Freiberg

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SONNENBERG, Klaus [DE/DE]; Taubenforst 3, D-52382 Niederzier (DE). KÜSSEL, Eckhard [DE/DE]; Fritz Pleystrasse 28, D-52353 Duren (DE). BÜNGER, Thomas [DE/DE]; Klopstockstrasse 3, D-09131 Chemnitz (DE), FLADE, Tilo [DE/DE]; Domerzaunstrasse 11, D-09599 Freiberg (DE). WEINERT, Berndt [DE/DE]; Turnerstrasse 9, D-09599 Freiberg (DE).
- (74) Anwälte: PRÜFER, Lutz, H. usw.; Harthauser Strasse 25d, D-81545 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

- (54) Title: DEVICE FOR PRODUCING SINGLE CRYSTALS
- (54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON EINKRISTALLEN

(57) Abstract

The invention relates to a device for producing single crystals, for example gallium-arsenide single crystals having a large diameter. The device comprises a cylindrical heating system with a bottom heating element (2), a top heating element (3) and a jacket heating element (5). The heating surfaces of the bottom and top heating elements are significantly greater than the cross-sectional area of the single crystal to be produced. The reaction chamber further comprises an insulator (6) which is configured such that a radial heat flow is suppressed and a strictly axial heat flow over the full height of the reaction chamber is ensured between the top heating element (3) and the bottom heating element (2).

(57) Zusammenfassung

Es wird eine Vorrichtung zur Herstellung von Einkristallen, beispielsweise von Galliumarsenid-Einkristallen mit grossem Durchmesser bereitgestellt, die eine zylindrische Heizeinrichtung mit einer Bodenheizung (2) und

einer Deckelheizung (3) und eine Mantelheizung (5) aufweist. Die Heizfläche des Boden- und des Deckelheizers sind wesentlich grösser als die Querschnittsfläche des herzustellenden Einkristalls. Im Reaktionsraum ist ferner ein Isolator (6) vorgesehen, das so ausgebildet ist, dass ein radialer Wärmefluss unterbunden wird und ein streng axialer Wärmefluss über die gesamte Höhe des Reaktionsraumes zwischen dem Deckelheizer (3) und dem Bodenheizer (2) gewährleistet wird.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JР	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Victnam
СН	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea .	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PΤ	Portugal		
CU	Kuba	ΚZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

WO 00/56954 PCT/EP00/02349

1

Vorrichtung zur Herstellung von Einkristallen

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Herstellung von Einkristallen. Insbesondere betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Herstellung von Einkristallen verschiedener Materialien, beispielsweise III-V-Materialien, beispielsweise von Galliumarsenid-Einkristallen.

Bekannte Vorrichtungen zur Herstellung von Einkristallen unterschiedlicher Materialien, beispielsweise III-V-Materialien, beispielsweise von Galliumarsenid, bestehen im allgemeinen aus Vielzonenöfen, wie sie zum Beispiel in der DE-OS-38 39 97, sowie in den US-Patentschriften US 4,086,424, US 4,423,516 und US 4,518,351 beschrieben sind.

Diese Vielzonenöfen können sowohl aus metallischen Heizleitern, als auch aus kohlenstoffhaltigen Heizleitern bestehen. Die sogenannten Mehrzonenrohröfen gestatten einen variablen Aufbau eines zur Kristallzüchtung geeigneten Temperaturfeldes und dessen Verschiebung entlang der Rotationsachse des Ofens.

WO 00/56954 PCT/EP00/02349

Derartige Vorrichtungen sind jedoch sowohl durch einen axialen als auch durch einen radialen Wärmefluß gekennzeichnet, was zu einer variablen Wachstumsgeschwindigkeit und einer ungünstigen Ausbildung der Phasengrenzfläche Schmelze-Kristall führen kann.

2

Desweiteren sind Mehr- bzw. Vielzonenöfen aus einer Vielzahl thermischer Bauelemente zusammengesetzt, was bei Wartungsarbeiten einen hohen Demontage- und Montageaufwand erfordert. Mit steigender Zonenzahl erhöht sich auch der Automatisierungsaufwand und die Störungsanfälligkeit der Mehrzonenöfen.

Insbesondere für die Herstellung von Einkristallen mit einem großen Durchmesser, beispielsweise 2", 3", 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm und größer, besteht das Problem, daß ein radialer Wärmefluß im Kristall eine Auswirkung auf die Isothermen, d.h. auf die Phasengrenze Schmelze-Einkristall in vertikaler bzw. axialer Richtung hat.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur Herstellung von Einkristallen, insbesondere von Einkristallen unterschiedlicher III-V-Materialien, beispielsweise von Galliumarsenid, bereitzustellen, bei der eine fast ausschließlich axiale Wärmeführung gewährleistet ist.

Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung nach Anspruch 1.

Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Die Vorrichtung hat den Vorteil, daß ein homogener axialer Wärmefluß gewährleistet ist und daß in radialer Richtung nahezu keine Wärme abfließen kann, d.h. einer radial homogenen Temperatur an der oberen und unteren Heizplatte und den dazwischenliegenden Schnitten.

Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten ergeben sich aus der Beschreibung eines Ausführungsbeispieles anhand der Figur 1.

Die Figur zeigt eine schematische Querschnittsansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einer sich vertikal erstrekkenden Rotationsachse M.

Die Vorrichtung zur Herstellung von Einkristallen weist einen zylinderförmigen Ofen 1 mit einer unteren Heizplatte als Bodenheizer 2 und einer oberen Heizplatte als Deckelheizer 3 auf. Die hochwärmeleitfähigen Heizplatten (z.B. CFC) haben einen kreisförmigen Querschnitt. Der Durchmesser des Bodenheizers 2 und des Deckelheizers 3 beträgt wenigstens das 1,5- bis 2-fache des Durchmessers des herzustellenden Einkristalles, so daß keine radialen Wärmeflüsse im System auftreten, die unter anderen durch die nichtrotationssymetrischen Einflüsse der Stromzuführung verursacht sind. Der Abstand zwischen Bodenheizer 2 und Deckelheizer 3 ist so bemessen, daß ein Tiegel 4 für die Kristallzüchtung dazwischen angeordnet werden kann.

Es ist eine nicht dargestellte Steuer- und Regeleinrichtung vorgesehen, mit der der Bodenheizer 2 und der Deckelheizer 3 derart angesteuert werden können, daß der Deckelheizer 3 auf einer in etwa der Schmelztemperatur des zu verarbeitenden Rohmateriales gehalten werden kann und der Bodenheizer 2 auf einer geringeren Temperatur gehalten werden kann. Die Steuerung ist ferner so ausgebildet, daß die Temperatur des Bodenheizers 2 im Vergleich zur Temperatur des Deckelheizers während des Züchtungsprozesses kontinuierlich abgesenkt werden kann, damit die Schmelze von Rohmaterial in dem Tiegel 4 kontinuierlich von unten nach oben erstarren kann.

Der zylindrische Ofen 1 weist ferner eine Mantelheizung 5 auf, die beispielsweise in der zylindrischen Begrenzungswand des WO 00/56954 PCT/EP00/02349

Ofens ausgebildet ist. Es ist eine Steuer- und Regeleinrichtung, vorgesehen, die derart ausgebildet ist, daß die Mantelheizung 5 auf einer Temperatur in der Nähe des Schmelzpunktes des in den Tiegel eingefüllten Rohmateriales gehalten werden kann.

Zum Verhindern eines Wärmeflusses in radialer Richtung weist der Ofen 1 ferner einen rotationssymmetrisch ausgebildeten Isolator 6 aus wärmeisolierendem Material, auf. Der Isolator 6 ist als ein kegelstumpfförmiger Körper ausgebildet mit einem koaxialen, oben und unten offenen zylindrischen Innenraum. Die Außenwand 7 des Isolators 6 hat somit die Form eines Kegelstumpfes und die Innenwand 8 die eines Zylinders. Der Isolator 6 ist in dem Ofen so angeordnet, daß sein jüngeres Ende 8 dem Bodenheizer 2 und das dem jüngeren Ende gegenüberliegende Ende dem Deckelheizer 3 zugewandt ist. Der Innendurchmesser des Isolators ist größer, als der Durchmesser des einzusetzenden Tiegels 4. Der Isolator ist bevorzugt aus Graphit gebildet. Durch die hohlkegelstumpfförmige Ausbildung des Wärmeübertragungsprofiles 6 ergibt sich ein freier Strahlungsraum 9 zwischen dem Wärmeübertragungsprofil und dem Mantelheizer 5, der zum azimutalen Ausgleich der Temperatur über den Hauptheizer beiträgt.

Durch die oben beschriebene Ausbildung und Anordnung des Isolators 6 in dem Ofen 1 wird eine von dem Deckelheizer 3 zu dem Bodenheizer 2 abnehmende Wärmeisolation in radialer Richtung zwischen einer in dem Tiegel 4 vorhandenen Schmelze von Rohmaterial und der Mantelheizung 5 bewirkt.

Im Betrieb wird zunächst der Tiegel 4, der den Kristallkeim enthält, in den Ofen eingesetzt. Dann wird Boroxid B_2O_3 und polykristallines Galliumarsenid zugegeben. Dann wird der Mantelheizer 5 derart angesteuert, daß er auf eine Temperatur gebracht wird, die ausreicht, um den Reaktionsraum bis auf die

WO 00/56954 PCT/EP00/02349

5

Arbeitstemperatur zu erhitzen und das feste Vorlaufmaterial aufzuschmelzen. Das eingefüllte polykristalline Galliumarsenid wird aufgeschmolzen, so daß es eine Galliumarsenidschmelze 10 bildet und von einer Abdeckschmelze 11 aus geschmolzenem B_2O_3 abgedeckt, damit eine Berührung des Galliumarsenids mit der Tiegelinnenwand vermieden wird.

Der Züchtungsprozeß wird dann wie folgt durchgeführt. Der Dekkelheizer 3 wird auf eine Temperatur von ca. 1300°C gebracht und der Bodenheizer 2 wird auf eine Temperatur von ca. 1200°C Zwischen Deckelheizer 3 und Bodenheizer 2 bildet sich ein Temperaturgradient, der nahezu dem Temperaturgradienten, der zwischen zwei unendlich ausgebildeten parallelen ebenen Platten gegeben ist, aus. Dann wird die Temperatur des Bodenheizers kontinuierlich abgesenkt, so daß die Schmelze 11 in dem Tiegel 4 gleichmäßig von unten nach oben auskristallisiert. Durch Steuerung und/oder Regelung der Temperatur des Bodenheizers 2 relativ zu der Temperatur des Deckelheizers 3 ist es somit möglich, die Schmelzisotherme in ihrer vertikalen Position zwischen den beiden Heizern zu verschieben und daher die Kristallisation zu steuern. Der Mantelheizer muß über die Prozeßzeit geringfügig nachgeführt werden, um den idealen axialen Temperaturfluß aufrecht zu erhalten, da der Gesamtenergiehaushalt des Systems abgesenkt wird und damit die radialen Verluste, die über den Mantelheizer kompensiert werden, abnehmen.

Der Mantelheizer 5 dient zum Ausgleich von globalen Wärmeverlusten und zur Unterbindung eines radialen Wärmeflusses. Durch den Isolator 6 wird im Bereich des Deckelheizers 3 eine hohe Isolation in radialer Richtung und im Bereich des Bodenheizers 2 eine geringere Isolation in radialer Richtung erreicht. Dadurch wird ein axialer Wärmefluß parallel zu Rotationsachse des Ofens während des Kristallisationsprozesses gewährleistet.

Während des Kristallisationsprozesses und danach ist so die Isothermenausbildung im Reaktionsgefäß in jeder Form möglich. Die angestrebte Isothermenform kann durch den streng axialen Wärmefluß über die gesamte Höhe des Reaktionsraumes zwischen dem Deckelheizer 3 und dem Bodenheizer 2 verschoben werden.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht die Herstellung von Einkristallen unterschiedlicher III-V-Materialien mit großen Durchmessern, wie beispielsweise Galliumarsenid mit einem Durchmesser von 2", 3", 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm und größer.

In Abhängigkeit von dem herzustellenden Einkristall, beispielsweise hinsichtlich seines Materials oder seines Durchmessers kann der Isolator 6 auch als Hohlzylinder ausgebildet sein. Ziel ist es lediglich einen streng axialen Wärmefluß zu gewährleisten und ein Abfließen der Wärme in radialer Richtung zu verhindern. Damit kann das Ziel erreicht werden, pro Zeiteinheit einen konstanten Kristallisationszuwachs zu erhalten.

In einer abgewandelten Form ist der Wärmeübertragungszylinder 6 nicht hohlkegelstumpfförmig ausgebildet, sondern ist so ausgebildet, daß ein gewünschter axialer Isothermenverlauf erreicht wird. Eine beliebige Form ist dabei denkbar und wird anhand des gewünschten Isothermeverlaufes berechnet. Durch die Form des Materials und die Art des Materials lassen sich beliebige gewünschte Wärmeflüsse modellieren. Damit kann das Ziel erreicht werden, pro Zeiteinheit einen konstanten Kristallisationszuwachs zu erhalten.

PATENTANSPRÜCHE

- 1. Vorrichtung zur Herstellung eines Einkristalls durch Züchtung aus einer Schmelze von Rohmaterial des herzustellenden Einkristalls, mit einer Heizeinrichtung (1) zum Erzeugen eines Temperaturgradienten innerhalb der Schmelze aus Rohmaterial, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizeinrichtung (1) einen ersten im wesentlichen ebenen hochwärmeleitfähigen Heizer (2) und parallel zu diesem und in einem Abstand dazu angeordneten zweiten im wesentlichen ebenen hochwärmeleitfähigen Heizer (3) aufweist, die auf unterschiedliche Temperaturen steuerbar sind und deren Heizfläche im Verhältnis zu dem Durchmesser des herzustellenden Einkristalls so bemessen ist, daß ein über die radiale Querschnittsfläche des herzustellen Einkristalls im wesentlichen homogene Temperatur und zwischen dem ersten Heizer (2) und dem zweiten Heizer (3) im wesentlichen ein homogener konstanter Temperaturgradient erzeugbar ist.
- 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der Fläche jedes Heizers (2,3) wenigstens das 1,5-fache der Querschnittsfläche des herzustellenden Einkristalls beträgt.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine Steuerung vorgesehen ist, die so ausgebildet ist, daß die Temperatur des ersten ebenen Heizers (2) gegenüber dem zweiten ebenen Heizer (3) kontinuierlich absenkbar ist.
- 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizeinrichtung als zylindrischer Ofen (1) ausgebildet ist wobei der erste Heizer als Bodenheizer

PCT/EP00/02349

- (2) und der zweite Heizer als Deckelheizer (3) ausgebildet ist, wobei der Abstand zueinander größer als die Länge des herzustellenden Einkristalls ist.
- 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der von den Heizern (2, 3) eingeschlossene Raum von einer diesen Raum umgebenden Mantelheizung (5) umschlossen ist.
- 6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, gekennzeichnet durch eine Isolatoreinrichtung (6), die derart ausgebildet ist, daß ein Wärmefluß in einer radialen Richtung senkrecht zur Zylinderachse (M) des Ofens (1) begrenzt wird.
- 7. Vorrichtung nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, daß die Isolatoreinrichtung (6) derart ausgebildet ist, daß sie eine von dem Deckelheizer (3) zu dem Bodenheizer (2) abnehmende Isolationswirkung aufweist.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolatoreinrichtung (6) als kegelstumpfförmiger Körper mit einem koaxialen zylindrischen und oben und unten offenen Hohlraum ausgebildet ist, der so in dem Ofen (1) angeordnet ist, daß sein jüngeres Ende den Bodenheizer zugewandt ist.
- 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolatoreinrichtung z.B. aus Graphit gebildet ist.
- 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein Tiegel (4) zur Aufnahme einer Schmelze
 an Rohmaterial des herzustellenden Einkristalls vorgesehen
 ist, der zwischen dem ersten Heizer (2) und dem zweiten Heizer (3) angeordnet ist.

- 11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung eine Vorrichtung zur Herstellung eines Einkristalls aus einem III-V-Verbundhalbleiter ist.
- 12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung eine Vorrichtung zum Herstellen eines Einkristalls aus Galliumarsenid ist.
- 13. Vorrichtung zur Herstellung eines Einkristalls durch Züchtung aus einer Schmelze von Rohmaterial des herzustellenden Einkristalls,

mit einer Heizeinrichtung (1) zum Erzeugen eines Temperaturgradienten innerhalb der Schmelze aus Rohmaterial, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizeinrichtung (1) einen rotationssymmetrischen Ofen (1) mit einer Rotationsachse (M) und mit einem im wesentlichen ebenen Bodenheizer (2) einem im wesentlichen ebenen Deckelheizer (3) aufweist, die auf unterschiedliche Temperaturen steuerbar sind und daß eine Isolatoreinrichtung vorgesehen ist, die derart ausgebildet ist, daß ein Wärmefluß in einer radialen Richtung senkrecht zur Rotationsachse (M) des Ofens (1) auf ein vorbestimmtes Maß begrenzbar ist.

- 14. Vorrichtung nach Anspruch 13 dadurch gekennzeichnet, daß die Isolatoreinrichtung (6) derart ausgebildet ist, daß sie eine von dem Deckelheizer (3) zu dem Bodenheizer (2) abnehmende Isolationswirkung aufweist.
- 15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Ofen zylindrisch ausgebildet ist und daß eine Steuereinrichtung vorgesehen ist, die so ausgebildet ist, daß die Temperatur des Bodenheizers (2) im Vergleich zur Temperatur des Deckelheizers (3) absenkbar ist.

- 16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolatoreinrichtung (6) als kegelstumpfförmiger Körper mit einem koaxialen zylindrischen und oben und unten offenen Hohlraum ausgebildet ist, der so in dem Ofen (1) angeordnet ist, daß sein jüngeres Ende den Bodenheizer (2) zugewandt ist.
- 17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß der Ofen (1) eine Mantelheizung (5) aufweist.
- 18. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmeübertragungsteil (6) eine beliebige rotationssymmetrische profilierte bzw. unprofilierte Form besitzen kann.

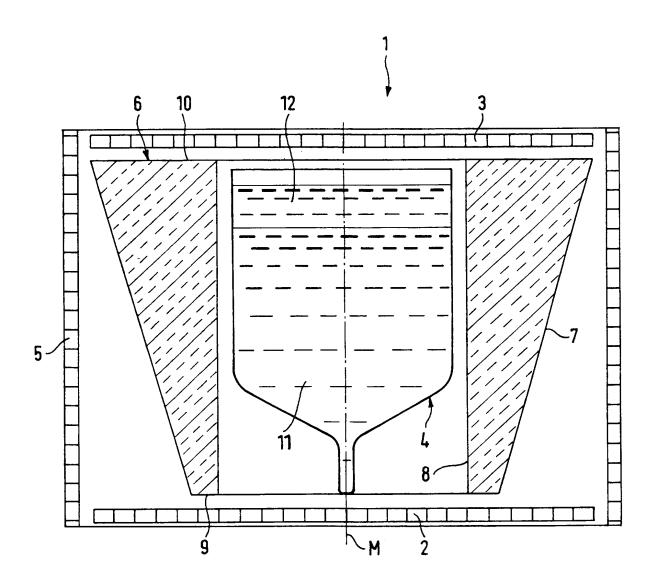


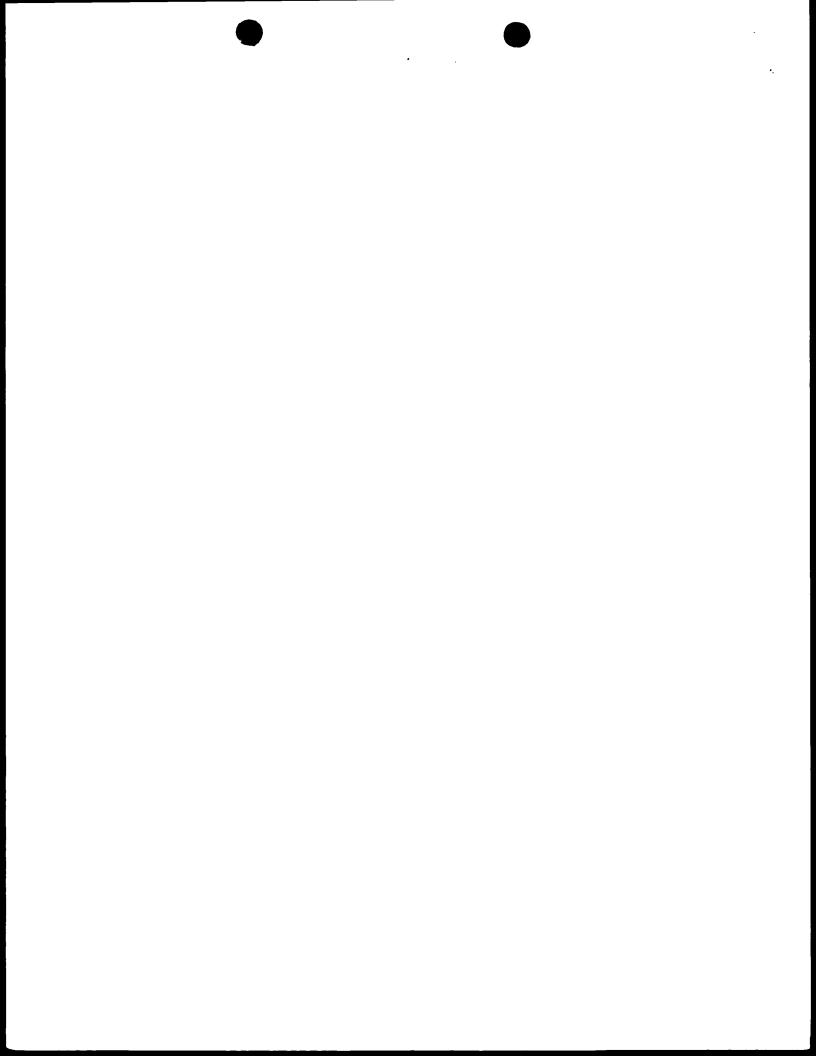
FIG.1



PCT REQUEST The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty. TITLE OF INVENTION Box No. I DEVICE FOR PRODUCING MONOCRYSTALS

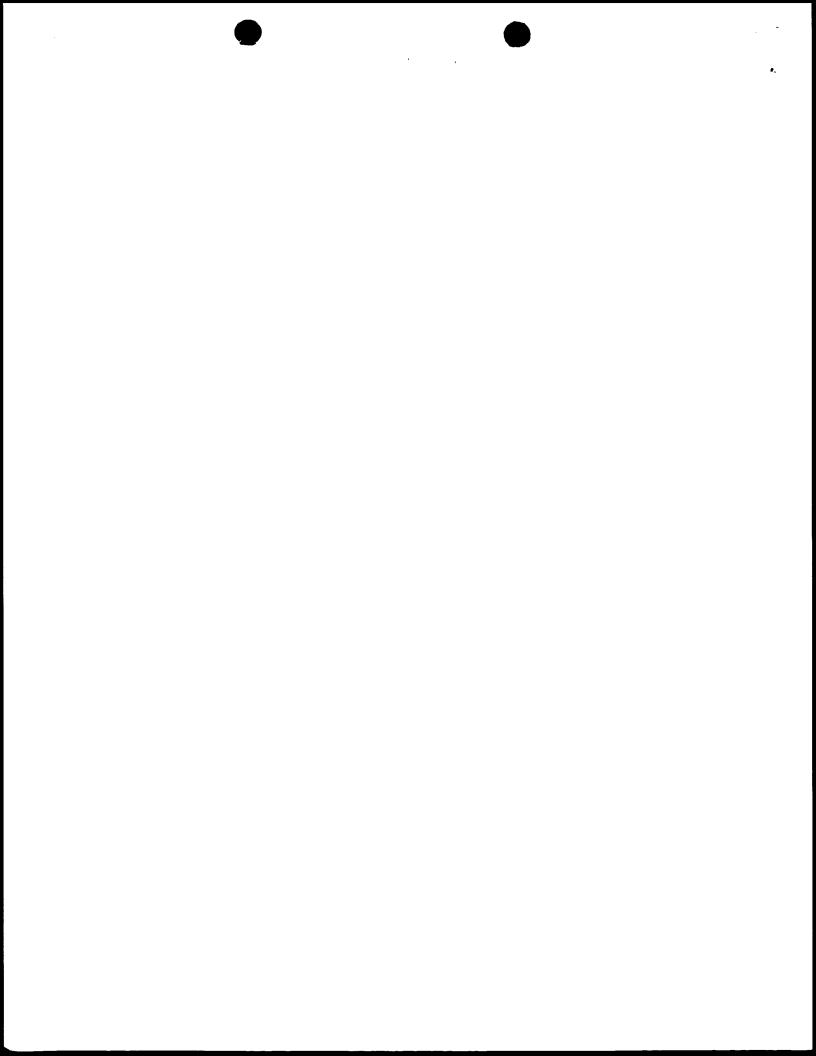
	•				
PCT	For re	ceiving Office use only			
101	International Application	No			
REQUEST	International Filing Date				
The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office	and "PCT International Application"			
according to the fateur exerptions.	Applicant's or agent's file tit desiredi (12 characters ma	e reference aximum HF 15-14247			
BOX NO. I TITLE OF INVENTION DEVICE FOR PRODUCING MONOCRYSTALS					
Box No. II APPLICANT					
Name and address: (Family name followed by given name: for designation. The address must include postal code and name of eaddress indicated in this Box is the applicant's State (that is, count of residence is indicated below.)	a legal entity, tult official ountry. The country of the try) of revidence if no State	This person is also inventor.			
FREIBERGER COMPOUND MATERIALS GmbH Am Junger Löwe Schacht 5		Telephone No. Facsimile No.			
09599 Freiberg Germany		Teleprinter No.			
State (that is, country) of nationality: Germany	State (that is, country) of Germany	residence:			
This person is applicant for the purposes of: all designated States except the United States of America only the States indicated in the Supplemental Box					
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FUR	THER) INVENTOR(S)				
Name and address: (Family name followed by given name: for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) This person is: applicant only					
SONNENBERG, Klaus Taubenforst 3 applicant and inventor					
52382 Niederzier inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)					

Germany	
State (that is, country) of nationality: Germany	State (that is, country) of residence: Germany
his person is applicant all designated all designated the United States all designated the United States	
Further applicants and/or (further) inventors are indicated on	a continuation sheet.
BOX NO. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE;	OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE
the person identified below is hereby/has been appointed to act on f the applicant(s) before the competent International Authorities as	behalf common representative
Name and address: (Family name followed by given name: for a l designation. The address must include postal coa PRÜFER, Lutz H. PRÜFER & PARTNER GbR Patentanwälte	ceal entity, full official cand name of country.) Telephone No. 089/640 640 Facsimile No.
Harthauser Straße 25d	089/642 22 38
81545 München	Teleprinter No.
Address for correspondence: Mark this check-box where no space above is used instead to indicate a special address to wh	agent or common representative is has been appointed and the tich correspondence should be sent.
orm PCT RO/101 (first sheet) (July 1998; reprint January 2001)	See Notes to the request form



Sheet No. 2

Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)					
If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.					
Name and address: iFamily name followed by given name, for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State This person is:					
KÜSSEL, Eckhard Fritz Pleystraße 28	applicant only applicant and inventor				
52353 Düren Germany	inventor only (If this check-hox is marked, do not fill in below.)				
State (that is, country) of nationality: Germany	State (that is, country) of residence: Germany				
This person is applicant for the purposes of: all designated the United States	States except ates of America the United States indicated in the Supplemental Box				
Name and address: (Family name followed by given name: for a l designation. The address must include postal code and name of cour address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.) BÜNGER, Thomas	egal entity, full official tivy. The country of the of residence if no State This person is: applicant only				
Klopstockstraße 3	applicant and inventor				
09131 Chemnitz Germany	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)				
State (that is, country) of nationality: Germany	State (that is, country) of residence: Germany				
This person is applicant for the purposes of: all designated the United States all designated the United States	States except tes of America only the States indicated in the Supplemental Box				
Name and address: (Family name followed by given name: for a le designation. The address must include postal code and name of coun address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.) FLADE. Tilo	egal entity, full official try. The country of the of residence if no State This person is: applicant only				
Dörnerzaunstraße 11	X applicant and inventor				
09599 Freiberg Germany	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)				
State (that is, country) of nationality: Germany	State (that is, country) of residence: Germany				
This person is applicant for the purposes of: all designated the United States all designated the United States	States except the United States the States indicated in the Supplemental Box				
Name and address: (Family name followed by given name: for a leasignation. The address must include postal code and name of counaddress indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.)	egal entity, full official arry. The country of the of residence if no State This person is: applicant only				
WEINERT, Berndt Turnerstraße 9	X applicant and inventor				
09599 Freiberg Germany	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)				
State (that is, country) of nationality: Germany	State (that is, country) of residence: Germany				
This person is applicant for the purposes of: all designated the United States all designated the United States	States except the United States the States indicated in the Supplemental Box				
Further applicants and/or (further) inventors are indicated or	a another continuation sheet.				



Supplemental Box If the Supplemental Box is not used, this sheet should not be included in the request

1. If, in any of the Boxes, the space is insufficient to furnish all the information: in such case, write "Continuation of Box No. ..." [indicate the number of the Box] and furnish the information in the same manner as required according to the captions of the Box in which the space was insufficient, in particular:

- if more than two persons are involved as applicants and or inventors and no "continuation sheet" is available: in such case, write "Continuation of Box No. III" and indicate for each additional person the same type of information as required in Box No. III. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.
- (ii) it, in Box No. II or in any of the sub-boxes of Box No. III, the indication "the States indicated in the Supplemental Box" is checked in such case, write "Continuation of Box No. II" or "Continuation of Box No. III" fas the case may be, indicate the name of the applicants; involved and, next to teach) such name, the Statets) (and or, where applicable, ARIPO, Eurasian, European or OAPI patent) for the purposes of which the named person is applicant;
- (iii) if, in Box No. II or in any of the sub-boxes of Box No. III, the inventor or the inventor/applicant is not inventor for the purposes of all designated States or for the purposes of the United States of America. in such case, write "Communition of Box No. II" or "Communition of Box No. III" or "Communition of Boxes No. II and No. III" (as the case may be), indicate the name of the inventor(s) and, next to (each) such name, the State(s) (and or, where applicable, ARIPO, Eurasian, European or OAPI patent) for the purposes of which the named person is inventor;
- (iy) if, in addition to the agent(s) indicated in Box No. IV, there are further agents: in such case, write "Continuation of Box No. IV" and indicate for each further agent the same type of information as required in Box No. IV;
- (v) if, in Box No. V, the name of any State (or OAPI) is accompanied by the indication "patent of addition," or "certificate of addition," or if, in Box No. V, the name of the United States of America is accompanied by an indication "continuation" or "continuation-in-part": in such case, write "Continuation of Box No. V" and the name of each State involved (or OAPI), and after the name of each state (or OAPI), the number of the parent title or parent application and the date of grant of the parent title or filing of the parent application:
- (vi) if, in Box No. VI, there are more than three earlier applications whose priority is claimed: in such case, write "Continuation of Box No. VI" and indicate for each additional earlier application the same type of information as required in Box No. VI:
- (vii) if, in Box No. VI, the earlier application is an ARIPO application: in such case, write "Continuation of Box No. VI", specify the number of the item corresponding to that earlier application and indicate at least one country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or one Member of the World Trade Organization for which that earlier application was filed.
- 2. If, with regard to the **precautionary designation statement** contained in Box No. V. the applicant wishes to exclude any State(s) from the scope of that statement: in such case, write "Designation(s) excluded from precautionary designation statement" and indicate the name or two-letter code of each State so excluded.
- 3. If the applicant claims, in respect of any designated Office, the benefits of provisions of the national law concerning non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty: in such case, write "Statement concerning non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty" and furnish that statement below.

Continuation of Box No. IV:

MATERNE, Dr. Jürgen HOFER, Dr. Dorothea

PRÜFER & PARTNER GbR Patentanwälte Harthauser Straße 25d 81545 München

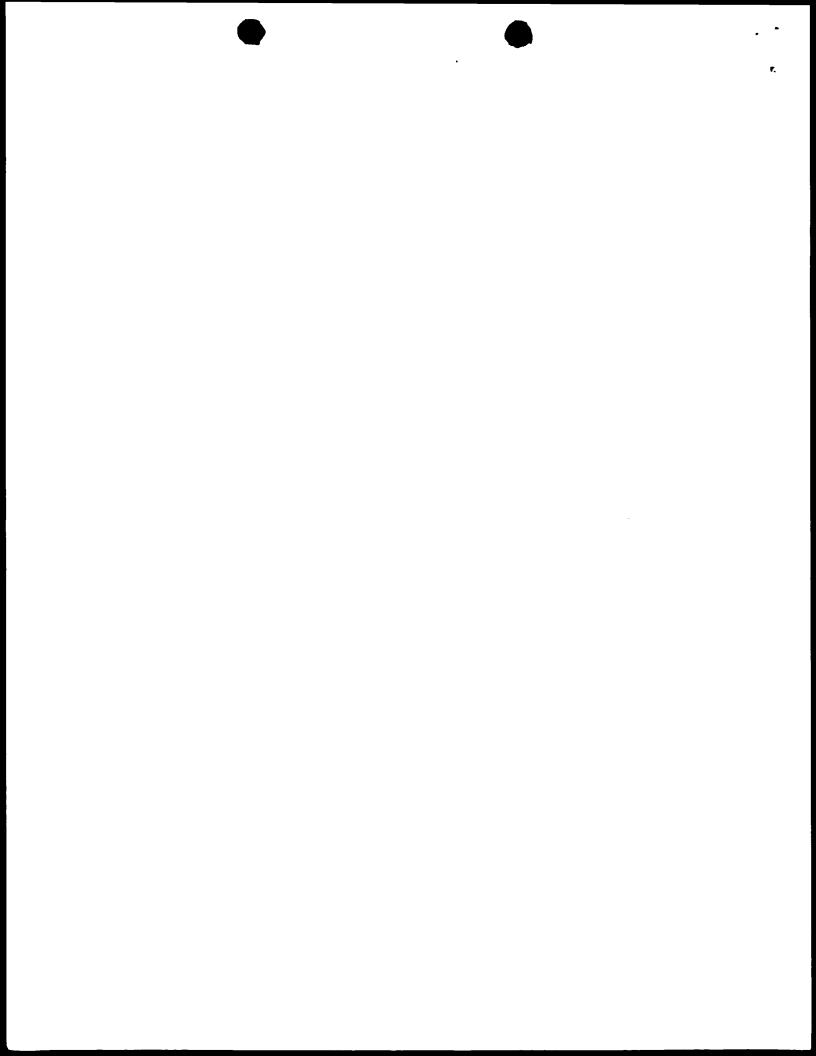
Tel.: 089/640 640 Telefax: 089/642 22 38



Box No	6.V DESIGNATION OF STATES			
The fol	llowing designations are hereby made under Rule 4.9(a) σ	nark the aj	oplicable check-hoxes: at least one must be markedr:	
Region	al Patent			
☐ AP	ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS SZ Swaziland, TZ United Republic of Tanzania, UG Ug of the Harare Protocol and of the PCT	Lesotho, anda, ZW	MW Malawi, MZ Mozambique, SD Sudan, SL Sierra Leone, Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State	
□ EA	Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Furasian Patent Convention and of the PCT			
EP EP	European Patent: AT Austria. BE Belgium, CH a DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB U	Inited Kin	witzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany, ngdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, key, and any other State which is a Contracting State of the	
□ OA	OAPI Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Centr GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, other State which is a member State of OAPI and a Contra	MR Maureting State	n Republic, CG Congo, Cl Côte d'Ivoire, CM Cameroon, ritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any e of the PCT (if other kind of protection or treatment desired,	
Nation	al Patent (if other kind of protection or treatment desired, spec			
I —	United Arab Emirates	_		
		=	Saint Lucia	
ı —	Antigua and Barbuda	_	Sri Lanka	
1 =	Albania	_	Liberia	
I =	Armenia	\square LS	Lesotho	
1 =	Austria	☐ LT	Lithuania	
1 =	Australia	□ LU	Luxembourg	
ı —	Azerbaijan	\square LV	Latvia	
☐ BA	Bosnia and Herzegovina	☐ MA	Morocco	
☐ BB	Barbados	\square MD	Republic of Moldova	
☐ BG	Bulgaria	\square MG	Madagascar	
☐ BR	Brazil		The former Yugoslav Republic of Macedonia	
☐ BY	Belarus		Mongolia	
□ BZ	Belize		Malawi	
□ Сл	Canada		Mexico	
□ CH	and LI Switzerland and Liechtenstein		Mozambique	
	China		Norway	
	Costa Rica		New Zealand	
l	Cuba	□ PL	Poland	
l	Czech Republic	□ PT	Portugal	
	Germany	□RO	Romania	
1	Denmark	=		
I	Dominica	□ RU	Russian Federation	
	Algeria		Sudan	
1 —		□ SE	Sweden	
☐ ES	Estonia		Singapore	
	Spain		Slovenia	
FI	Finland	□ SK	Slovakia	
	United Kingdom		Sierra Leone	
	Grenada	∐ TJ	Tajikistan	
l	Georgia	☐ TM	Turkmenistan	
	Ghana	☐ TR	Turkey	
. —	Gambia		Trinidad and Tobago	
1 —	Croatia	☐ TZ	United Republic of Tanzania	
	C :	∐ UA	Ukraine	
🗀 ib	Indonesia	∐ UG	Uganda	
	Israel	E US	United States of America	
	India	□ UZ	Uzbekistan	
	Iceland	□ VN	Viet Nam	
k JP	Japan	∐ YU	Yugoslavia	
=	Kenya	□ ZA	South Africa,	
□ KG	Kyrgyzstan	□ ZW	Zimbabwe	
□ K₽	Democratic People's Republic of Korea		ox reserved for designating States which have become	
□ KR	Republic of Korea	party to	the PCT after issuance of this sheet:	
□ KZ	Kazakhstan	□		
Precaut designat from the designat at the ex	tionary Designation Statement: In addition to the designations which would be permitted under the PCT except any e scope of this statement. The applicant declares that the tion which is not confirmed before the expiration of 15 month piration of that time limit. (Confirmation including fees) must	designatiose additions from the	de above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other (on(s)) indicated in the Supplemental Box as being excluded onal designations are subject to confirmation and that any priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant receiving Office within the 15-month time limit.)	
rorm PC	Γ/RO 101 (second sheet) (January 2001)		See Notes to the request form	



Box No. VI PRIORITY C	LAIM	Further pric	Further priority claims are indicated in the Supplemental Box.			
Filing date	Number		Where earlier applicat	ion is:		
of earlier application (day month year)	of earlier applicatio	national application: country	regional application:* regional Office	international application: receiving Office		
19/03/1999	199 12 484.1	Germany				
item (2)						
item (3)						
of the earlier application(s purposes of the present int	s) (only it the earlier aj ternational application i	ransmit to the International Bun oplication was filed with the is the receiving Officer identifi	Office which for the led above as item(s):	<u> </u>		
* Where the earlier application is a Convention for the Protection of In	an ARIPO application, it is adustrial Property for which	is mandatory to indicate in the Su In that earlier application was file	pplemental Box at least on d (Rule 4 10(h)(iia - See Si	e country party to the Paris		
	NAL SEARCHING A			77		
Choice of International Search it two or more International Sea competent to carry out the interna- the Authority chosen: the two-letter	irching Authorities are attional search, indicate	Request to use results of ear search has been carried out by or	requested from the Internal	tional Searching Authority):		
ISA /	code may ne avear.	Date /day month/year)	Number	Country tor regional Office)		
Box No. VIII CHECK LIST	> LANCHAGE OF F	II INC		 .		
This international application co		ional application is accompan	ied by the item(s) marks	A holow		
the following number of sheets	s: 1. 🗐 fee ca	eleulation sheet	ned by the item(s) marki	La below.		
request :	5 2. ★ separa	ate signed power of attorney				
description (excluding sequence listing part) :	6 3. copy	of general power of attorney;	reference number, if any	ei.		
claims	4	nent explaining lack of signatu	ire			
abstract 1 5. priority document(s) identified in Box No. VI as item(s): (1)						
	1	ation of international application				
sequence listing part of description 7. separate indications concerning deposited microorganism or other biological material						
·	.	otide and or amino acid sequer	nce listing in computer r	eadable form		
Total Hamber of Silects .		tspecify): Cheque				
Figure of the drawings which should accompany the abstract:	1	Language of filing of the international application:	German	1984		
Next to each signature, indicate the name	OF APPLICANT OR		20 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
signed: Hofer Professional Representati		те сарасах яг ктоп те рект куп.	NII SICH COJACIA IS HOLOGAR	us from reading the request).		
L. Data of anti-al accident of the		or receiving Office use only -				
Date of actual receipt of the international application:	ригропеа			2. Drawings:		
timely received papers or dra	3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:					
corrections under PCT Artic	4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):					
5. International Searching Auth (if two or more are competen		until search	l of search copy delayed n fee is paid.			
Date of receipt of the record cop by the International Bureau:		nternational Bureau use only .				



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte .onal Application No PCT/EP 00/02349

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C30B11/00 C30E C30B29/42 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C30B Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X ALTHAUS M ET AL: "SOME NEW DESIGN 1-6,8,FEATURES FOR VERTICAL BRIDGMAN FURNACES 10-13, 15,17,18 AND THE INVESTIGATION OF SMALL ANGLE GRAIN BOUNDARIES DEVELOPED DURING VB GROWTH OF GAAS" JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, NL, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, vol. 166, no. 1/04, 1 September 1996 (1996-09-01), pages 566-571, XP000686560 ISSN: 0022-0248 page 567; figure 1 -/--

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the pnority date claimed	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone. "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 27 July 2000	Date of mailing of the international search report 03/08/2000
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer

1

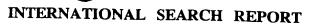
NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Cook, S



Inte ional Application No PCT/EP 00/02349

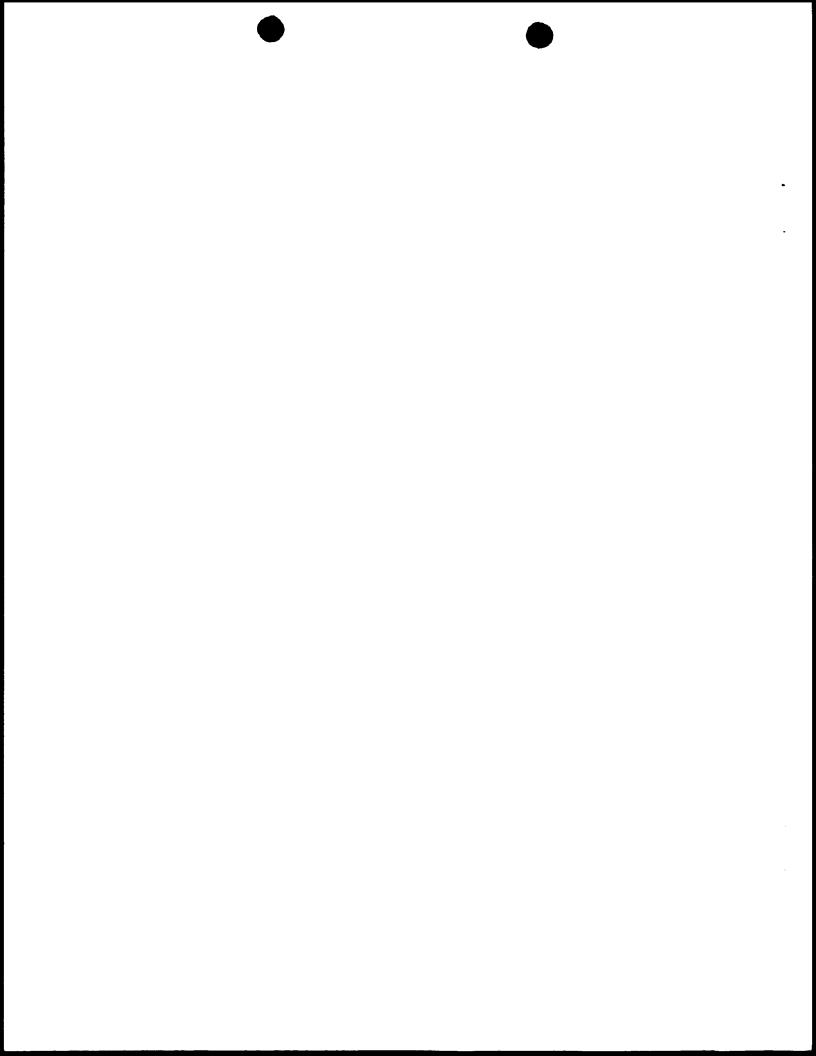
C.(Continu	uation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	1/ 02349
Category °		Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 13, 30 November 1998 (1998-11-30) & JP 10 203891 A (HITACHI CABLE LTD), 4 August 1998 (1998-08-04) abstract	
Ą	US 4 086 424 A (MELLEN SR ROBERT H) 25 April 1978 (1978-04-25) cited in the application	
<u>.</u> .	DE 33 23 896 A (LEYBOLD HERAEUS GMBH & CO KG) 17 January 1985 (1985-01-17)	



Information on patent family members

Inte Jonal Application No PCT/EP 00/02349

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 10203891	Α	04-08-1998	NONE	
US 4086424	Α	25-04-1978	NONE	
DE 3323896	Α	17-01-1985	NONE	

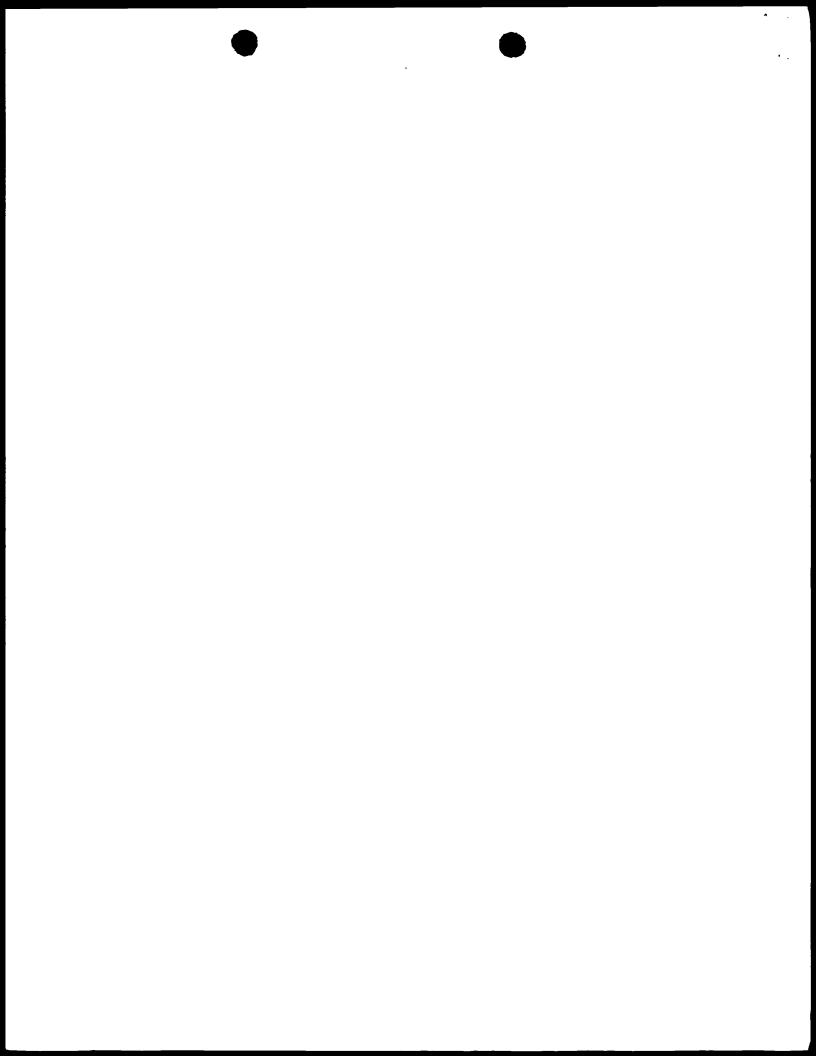


PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwaits	ichen des Anmelders oder Anwalts WEITERES Siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT-ISA 220) sowie, sowiet		
HF 15-14247.2	VORGEHEN	zutreffend, nachsteh	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmel	dedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat Jahr)
PCT/EP 00/02349	(Tag:Monat:Jahr) 16/03/2	2000	19/03/1999
Anmelder	10/03/2		15,03,155
Attitle			
FREIBERGER COMPOUND MATERIA	US CMRH at al		
FREIBERGER COM OUND MATERIA	ALS GHDH et at	·	
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int			e erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	ßt insgesamt <u>3</u>	Blätter.	
Darüber hinaus liegt ihm jew	reils eine Kopie der in d	esem Bericht genannte	en Unterlagen zum Stand der Technik bei.
1 Coundless des Basishte			
Grundlage des Berichts Hipsichtlich der Sprache ist die inter	rnationale Recherche au	if der Grundlage der in	sternationalen Anmeldung in der Sprache
durchgeführt worden, in der sie eing	ereicht wurde, sofern ur	nter diesem Punkt nich	ts anderes angegeben ist.
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) (einer bei der Behörde e	eingereichten Übersetzung der internationalen
			er Aminosäuresequenz ist die internationale
Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anmel		-	
zusammen mit der internation	•		singereicht worden ist
bei der Behörde nachträglich	_		angereione worden ist.
bei der Behörde nachträglich		-	n ist
1	•	•	okoll nicht über den Offenbarungsgehalt der
internationalen Anmeldung i	m Anmeldezeitpunkt hir	nausgeht, wurde vorgel	legt.
Die Erklärung, daß die in cor wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form er	faßten Informationen d	lem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen.
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht rech	erchierbar erwiesen (siehe Feld I).
3. Mangelnde Einheitlichkeit			,.
3	3 1	,	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dung		
Wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut geneh	ımigt.	
wurde der Wortlaut von der f	Behörde wie folgt festge	setzt:	
5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	anaialista Martiaust aanah	miat	
wird der vom Anmelder eing wurde der Wortlaut nach Re Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Ste	gel 38.2b) in der in Feld innerhalb eines Monats	III angegebenen Fass	ung von der Behörde festgesetzt. Der Absendung dieses internationalen
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen is	st mit der Zusammenfas	sung zu veröffentliche	n: Abb. Nr
wie vom Anmelder vorgesch	lagen		keine der Abb.
weil der Anmelder selbst kei	ne Abbildung vorgeschl	agen hat.	
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeicl	nnet.	



a. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C30B11/00 C30B29/42

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

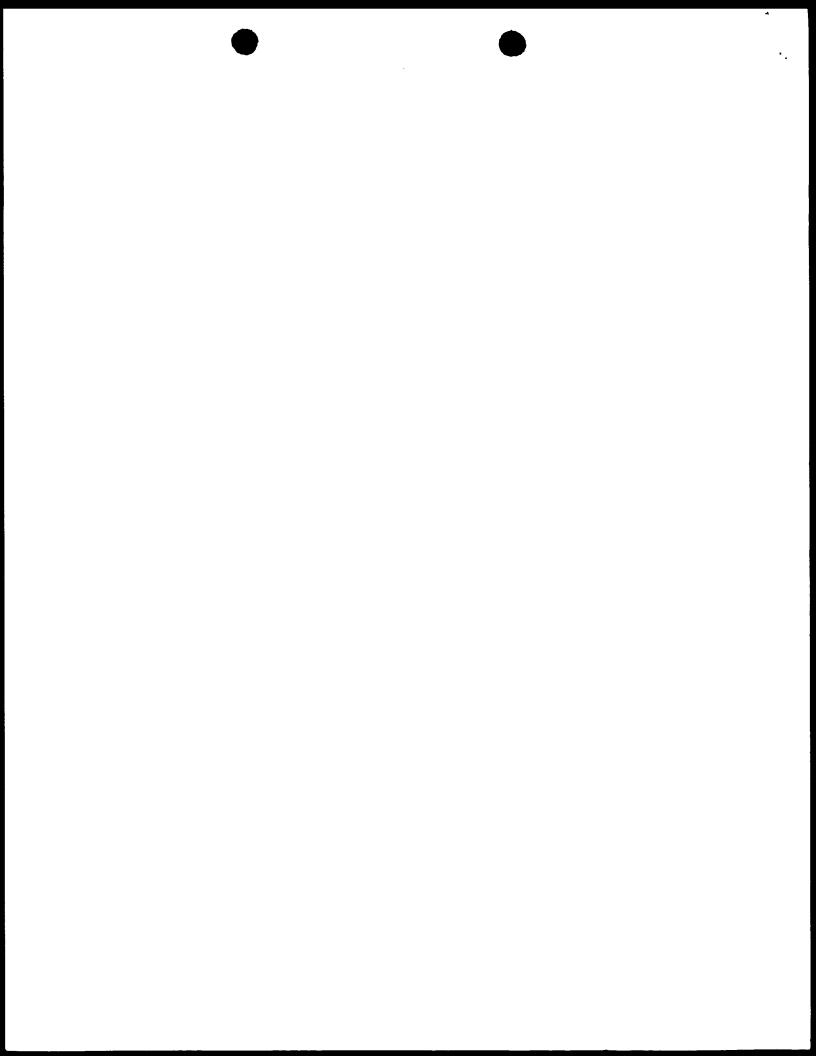
Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr Anspruch Nr.
X	ALTHAUS M ET AL: "SOME NEW DESIGN FEATURES FOR VERTICAL BRIDGMAN FURNACES AND THE INVESTIGATION OF SMALL ANGLE GRAIN BOUNDARIES DEVELOPED DURING VB GROWTH OF GAAS" JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, NL, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, Bd. 166, Nr. 1/04, 1. September 1996 (1996-09-01), Seiten 566-571, XP000686560 ISSN: 0022-0248 Seite 567; Abbildung 1	1-6,8, 10-13, 15,17,18
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsansprüch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
dem beanspruchten Priontatsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
27. Juli 2000	03/08/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Cook, S

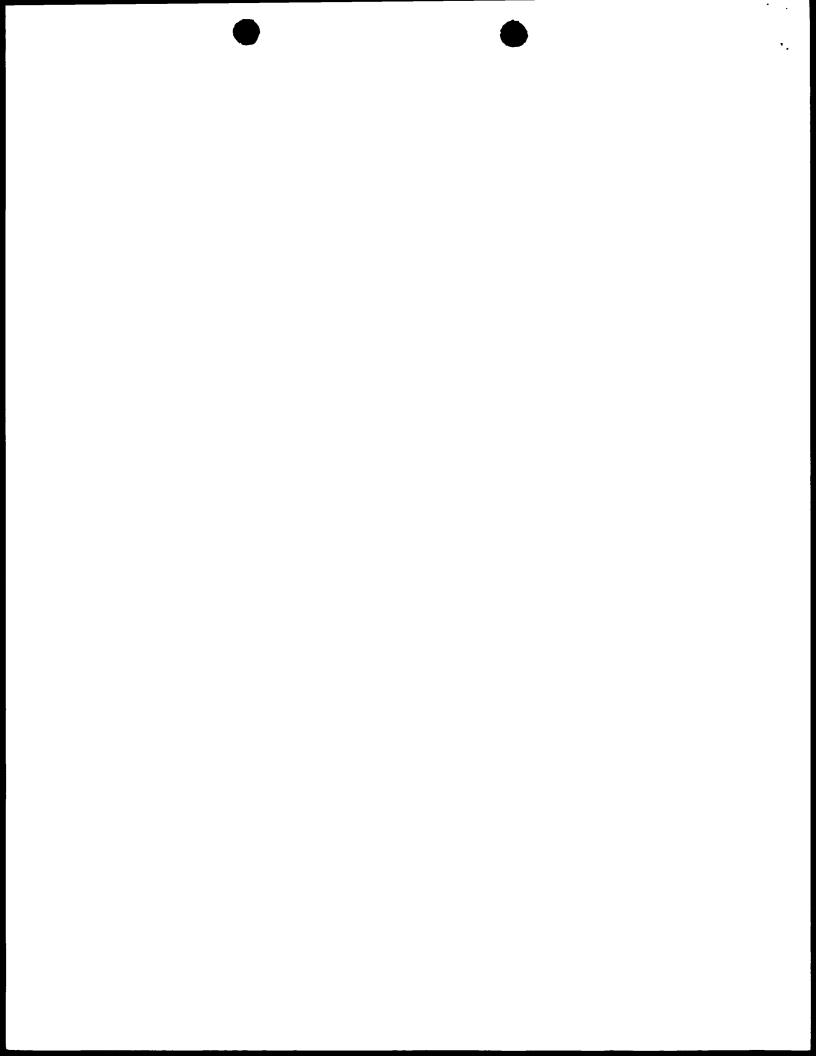


INTERNATIONALER HERCHENBERICHT

Intermales Aktenzeichen
PCT/EP 00/02349

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr Anspruch Nr
А	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998. no. 13, 30. November 1998 (1998-11-30) & JP 10 203891 A (HITACHI CABLE LTD). 4. August 1998 (1998-08-04) Zusammenfassung	
Α	US 4 086 424 A (MELLEN SR ROBERT H) 25. April 1978 (1978-04-25) in der Anmeldung erwähnt	
А	DE 33 23 896 A (LEYBOLD HERAEUS GMBH & CO KG) 17. Januar 1985 (1985-01-17)	

1

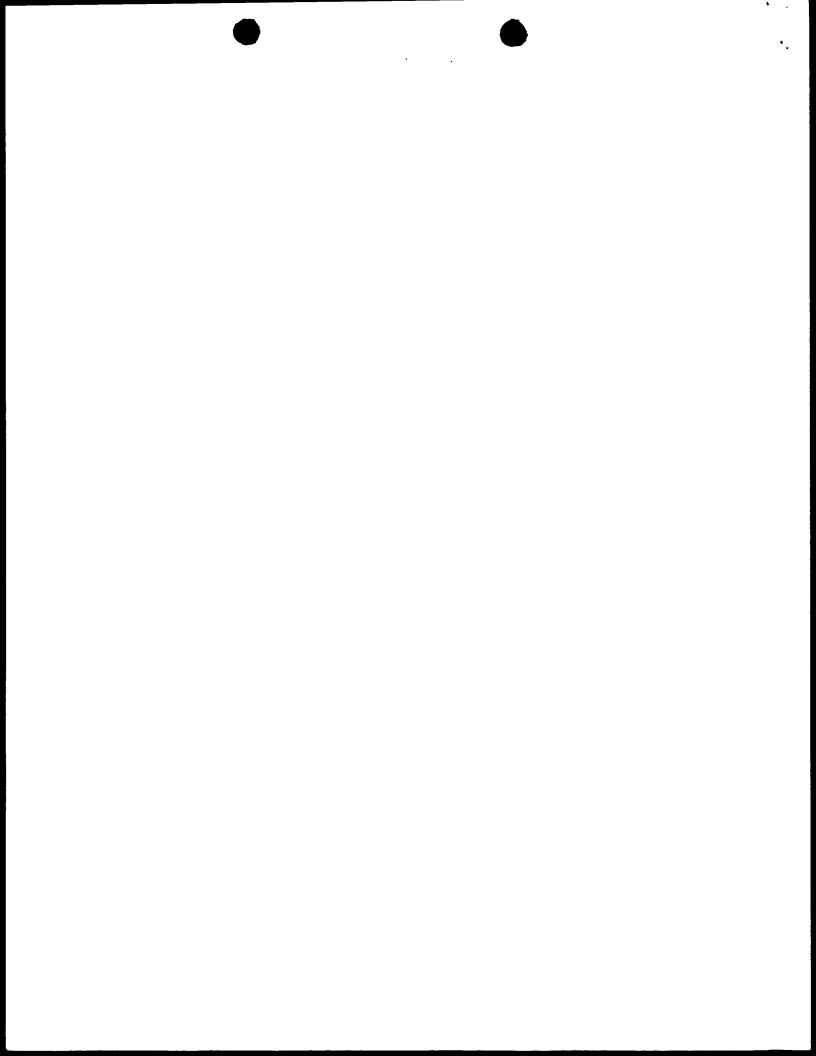


INTERNATIONALER REPERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentrichungen, die Zeilben Patentfamilie genoren

nter bles Aktenzeichen
PCT/EP 00/02349

im Recherchenbericht angeführtes Patentdokume		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veroffentlichung
JP 10203891	А	04-08-1998	KEINE	
US 4086424	Α	25-04-1978	KEINE	
DE 3323896	Α	17-01-1985	KEINE	



Copy for the Elected Office (FO/US)

TENT COOPERATION TREALLY

	From the INTERNATIONAL BUREAU					
PCT						
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day month year)	PRUFER, Lutz, H. Prüfer & Partner GbR Harthauser Strasse 25d D-81545 Munchen ALLEMAGNE					
20 November 2000 (20.11.00)						
Applicant's or agent's file reference HF 15-14247.2 me	IMPORTANT NOTIFICATION					
International application No. PCT EP00 02349	International filing date (d3, month year) 16 March 2000 (16 03.00)					
The following indications appeared on record concerning: the applicant the inventor The following indications appeared on record concerning:	the common representative					
Name and Address PRÜFER, Lutz, H.	State of Net onality State of Residence					
Harthauser Strasse 25d D-81545 München Germany	Telephone No. 089 640 640					
	Facsimile No. 089 642 22 38					
	Teleprinter No					
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the person the name X the additional the person the name X the additional that the additional that the person the name that the additional that the person that						
Name and Address PRÜFER, Lutz, H.	State of Nationality State of Residence					
Prüfer & Partner GbR Harthauser Strasse 25d <u>D</u> -81545 München	Telephone No. 089 640 640					
Germany	Facsimue No. 089 642 22 38					
	Teleprinter No					
3. Further observations of necessary. The agent's new address on the Demand has be case of disagreement, the International Bureau	een considered as a change under Rule 92bis. In should be notified immediately.					
4. Alieb, of this notification has been centitor						
the receiving Office	tille des ancted Office concerned					
the international Searching Authority	X the Hindsa (Iffices concerned					
X the international Presiminar, Examining Authority	- 55.re.					
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes	Authorized officer A. Karkachi					
1211 Geneva 20, Switzerland						
Factor (2014) 1142, 1740,74,96	ETWORPS THE LANGE STATES AND					

From the INTERNATIONAL BUREAU

PRÜFER, Lutz, H. Harthauser Strasse 25d

D-81545 München ALLEMAGNE

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence) - 9. Okt. 2000 Eing. Date of mailing (day/month/year) 28 September 2000 (28.09.00) Termin Applicant's or agent's file reference IMPORTANT NOTICE HF 15-14247.2 me Priority date (day/month/year) International filing date (day/month/year) International application No. 19 March 1999 (19.03.99) 16 March 2000 (16.03.00) PCT/EP00/02349 **Applicant** FREIBERGER COMPOUND MATERIALS GMBH et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

EP,JP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 28 September 2000 (28.09.00) under No. WO 00/56954

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

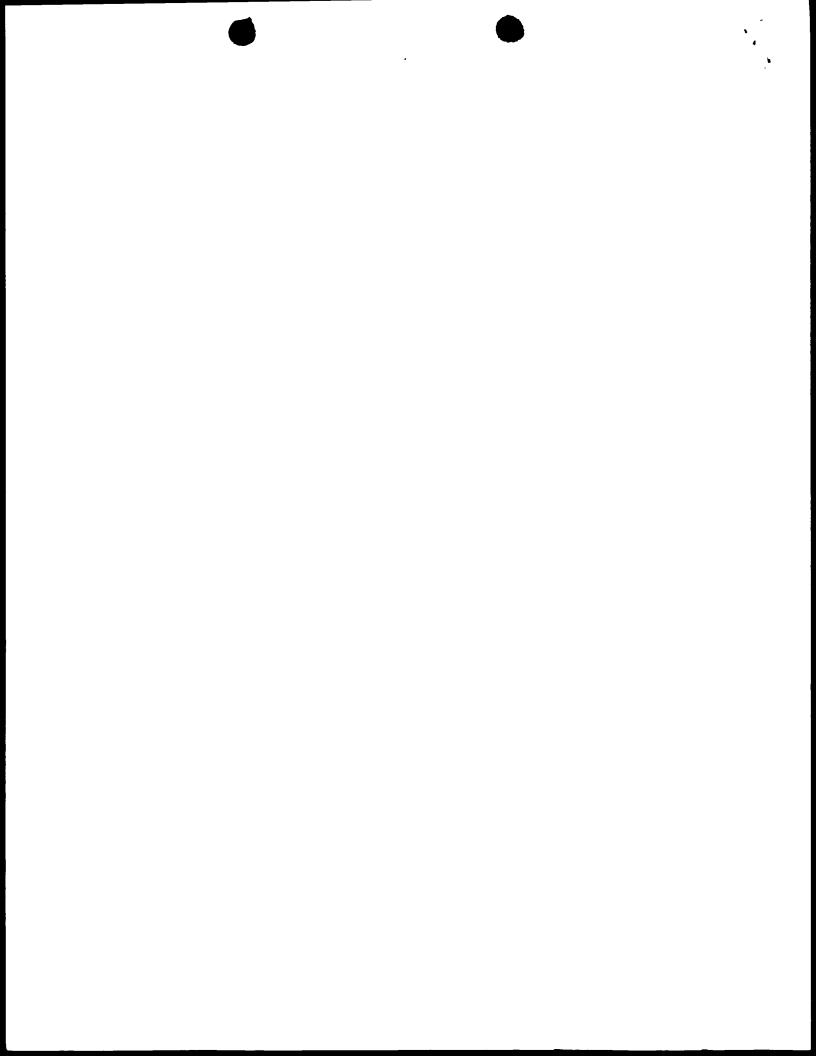
Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

Authorized officer The International Bureau of WIPO J. Zahra 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Telephone No. (41-22) 338.83.38 Facsimile No. (41-22) 740.14.35

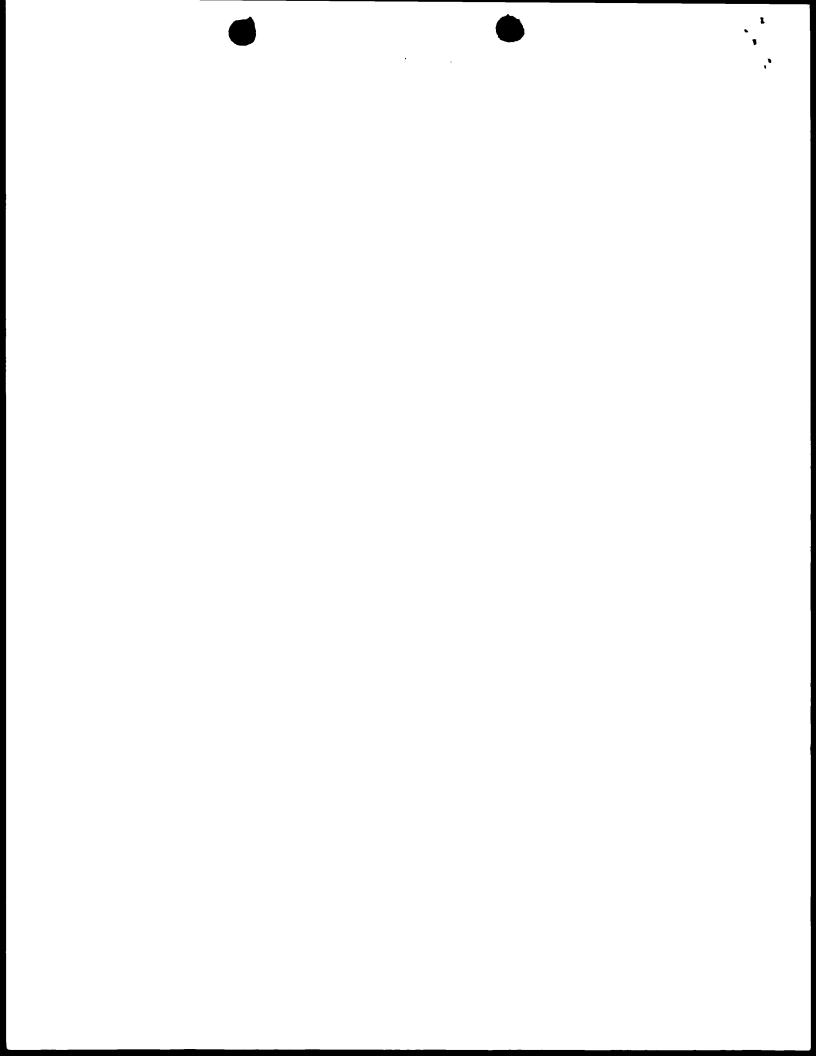


Continuation of Form PCT/IB/308

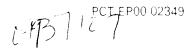


Date of mailing (day/month/year) 28 September 2000 (28.09.00)	IMPORTANT NOTICE
Applicant's or agent's file reference HF 15-14247.2 me	International application No. PCT/EP00/02349

The applicant is hereby notified that, at the time of establishment of this Notice, the time limit under Rule 46.1 for making amendments under Article 19 has not yet expired and the International Bureau had received neither such amendments nor a declaration that the applicant does not wish to make amendments.



... ATENT COOPERATION TREATY



From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2 5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day month year)

20 November 2000 (20.11.00)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Enits capacity as elected Office

International application No.
PCT EP00 02349

International filing date (day month year)
16 March 2000 (16.03.00)

Applicant

Applicant's or agent's file reference
HF 15-14247.2 me

Priority date (day month year)
19 March 1999 (19.03.99)

Applicant

SONNENBERG, Klaus et al.

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	12 October 2000 (12.10.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on.
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

A. Karkachi

Telephone 1.0 41-22 338.83 38

Face Holy No. 141122, 740,14 36



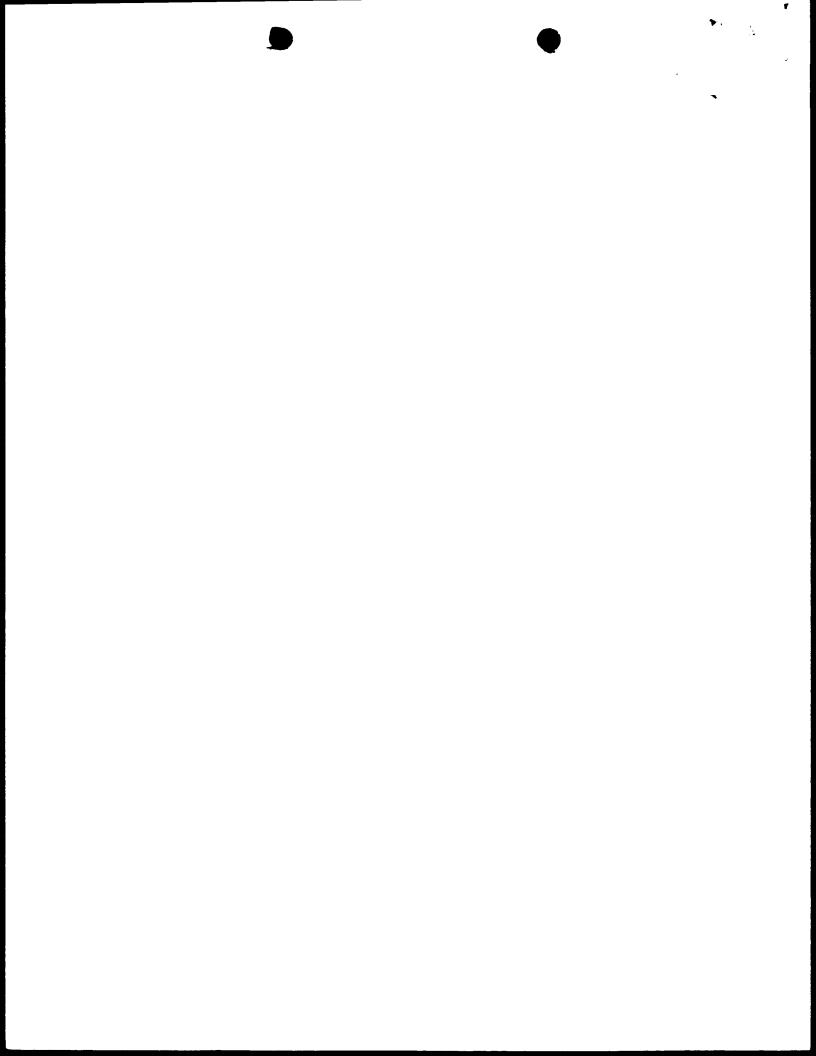
PCT

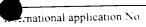
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference HF 15-14247.2 me	FOR FURTHER ACTION	Preliminary	cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/EP00/02349	International filing date (day n 16 March 2000 (16.0		Priority date (day month year) 19 March 1999 (19.03.99)
International Patent Classification (IPC) or r C30B 11/00, 29/42	national classification and IPC		
Applicant FREIB	ERGER COMPOUND MA	ATERIALS	GMBH
This international preliminary exact Authority and is transmitted to the second control of the second con	amination report has been prepapplicant according to Article 36	pared by this	International Preliminary Examining
2. This REPORT consists of a total of	sheets. including	ng this cover s	sheet.
Lan amonded and are the	anied by ANNEXES, i.e., sheets basis for this report and/or sheets in 607 of the Administrative Instr	containing i	tion, claims and/or drawings which have ectifications made before this Authority the PCT).
These annexes consist of a	total of 5 sheets.		
3. This report contains indications rel	ating to the following items:		
I Basis of the repor			
II Priority			
III Non-establishme	nt of opinion with regard to nove	elty, inventive	step and industrial applicability
IV Lack of unity of			
V Reasoned statem citations and exp	ent under Article 35(2) with regal lanations supporting such statem	rd to novelty, ent	inventive step or industrial applicability;
VI Certain documen	its cited		
VII Certain defects in	n the international application		
VIII Certain observat	ions on the international applicat	ion	
Date of submission of the demand	Date	of completion	of this report
12 October 2000 (12	.10.00)	23	March 2001 (23.03.2001)
Name and mailing address of the IPEA/El	P Autho	orized officer	
Faceimula Na	Telen	hone No.	

Traislation

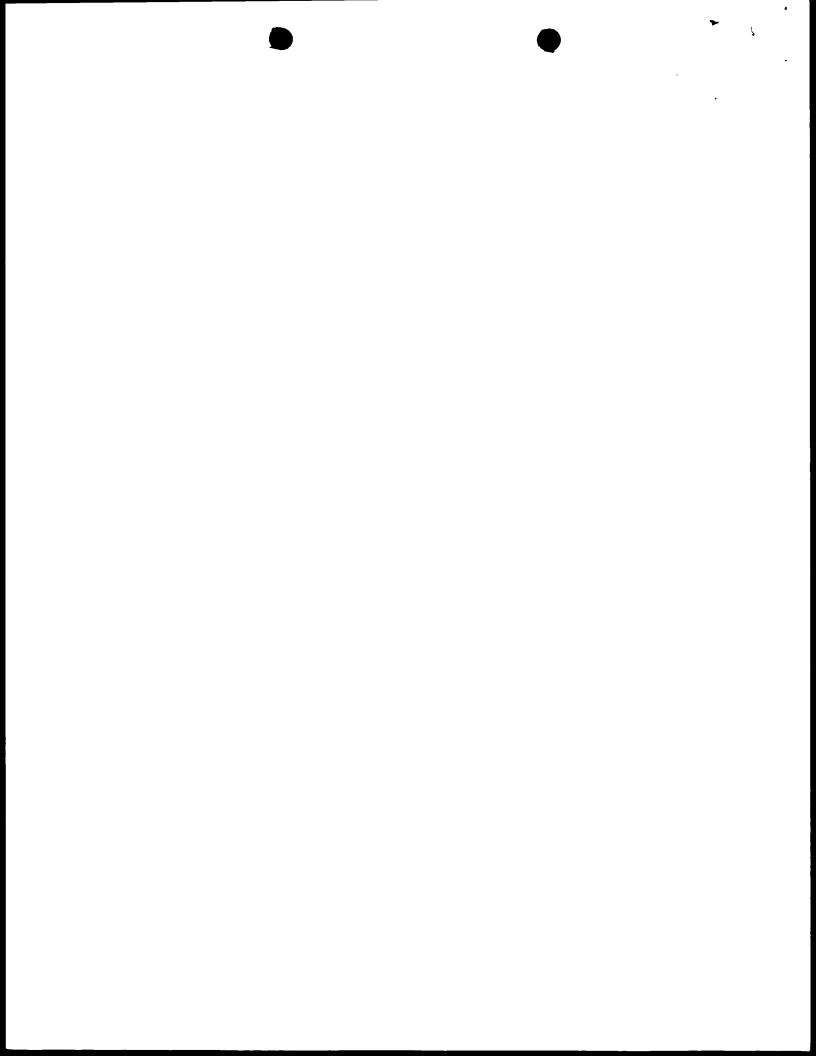




INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/EP00/02349

I. Basis of the	report				
1. This report under Article	has been drawn o	n the basis of (in this report as	Replacement sheet "ortginally filed"	s which have been furnished to the and are not annexed to the repo	receiving Office in response to an invitation rt since they do not contain amendments (
$\overline{\cdot}$	the international	application as	originally filed.		
$\overline{}$	the description.	pages	1.3-6	, as originally filed.	
		pages		filed with the demand.	12.14 1.2001 12.02.2001)
		pages	22	_, filed with the letter of	12 March 2001 (12.03.2001)
		pages		_, filed with the letter of	
[>]	the claims.	Nos.		_ , as originally filed.	
				as amended under Article	19.
				_ , filed with the demand.	
					12 March 2001 (12.03.2001)
		Nos		filed with the letter of	
ন	the drawings,			_ , as originally filed,	
		sheets/fig _		_ , filed with the demand.	
		sheets/fig _		, filed with the letter of	,
		sheets/fig _		filed with the letter of	
2. The amend	lments have resul	ted in the canc	ellation of:		
	the description,	pages			
	the claims.	Nos.		-	
	the drawings.	sheets/fig _		-	
to g	s report has been to beyond the disc l observations, if	closure as filed	if (some of) the a , as indicated in t	mendments had not been made he Supplemental Box (Rule 70	e, since they have been considered ().2(c)).



INTERNATIONAL PREIMINARY EXAMINATION REPORT

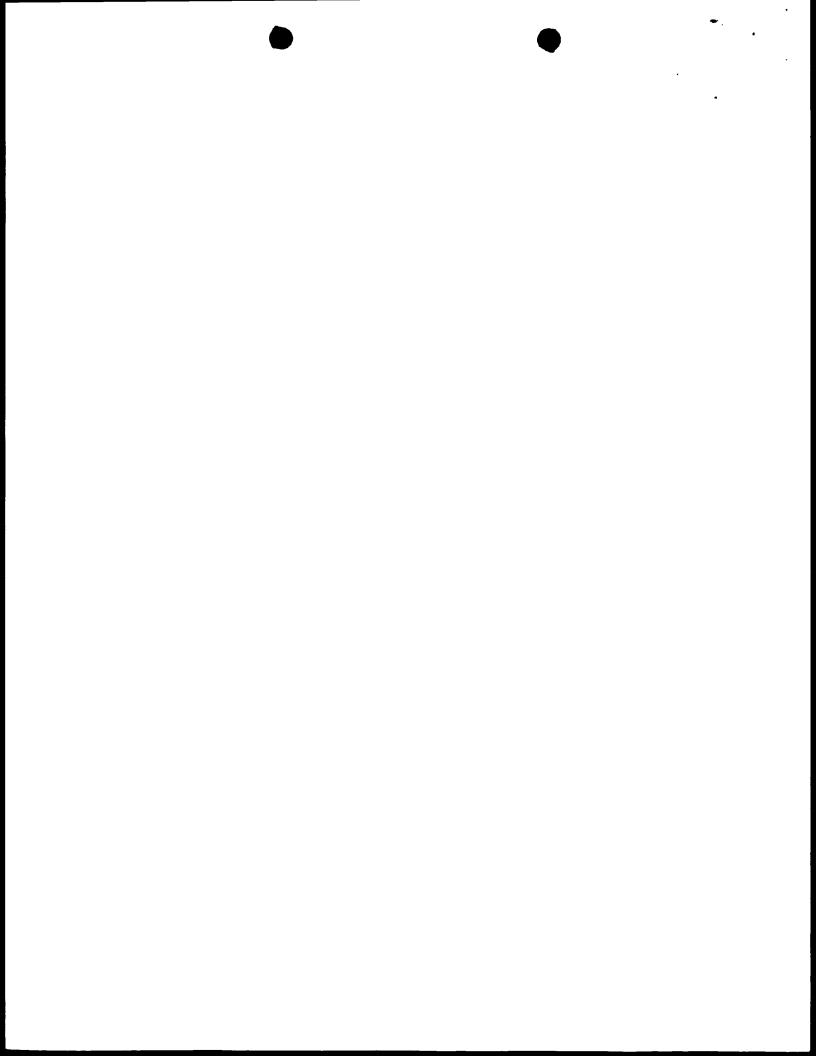
iternational application No. PCT/EP 00/02349

Υ.	Reasoned statement under Article 3: citations and explanations supportin	5(2) with regard to novelting such statement	y, inventive step or industrial appli	cability;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-13	YES
		Claims		NO NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-13	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-13	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

- 1) Reference is made to the following document:
 - D1: ALTHAUS M ET AL: 'SOME NEW DESIGN FEATURES FOR VERTICAL BRIDGMAN FURNACES AND THE INVESTIGATION OF SMALL ANGLE GRAIN BOUNDARIES DEVELOPED DURING VB GROWTH OF GAAS' JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, NL, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, Vol. 166, No. 1/04, 1 September 1996 (1996-09-01), pages 566-571, XP000686560 ISSN: 0022-0248.
- Document D1 discloses a device for producing monocrystals, in particular GaAs monocrystals. The device comprises a heating appliance, configured as a cylindrical furnace. The cross-sectional surface of the furnace is substantially greater than that of the crucible in which the crystal is produced. The heating appliance is divided into a bottom heater, a top heater and a jacket heater.

The top heater is kept at a constant temperature above the melting point during the growth of the crystal. The temperature of the bottom heater, however, is continuously reduced. This results in a crystallisation front that rises upwards.

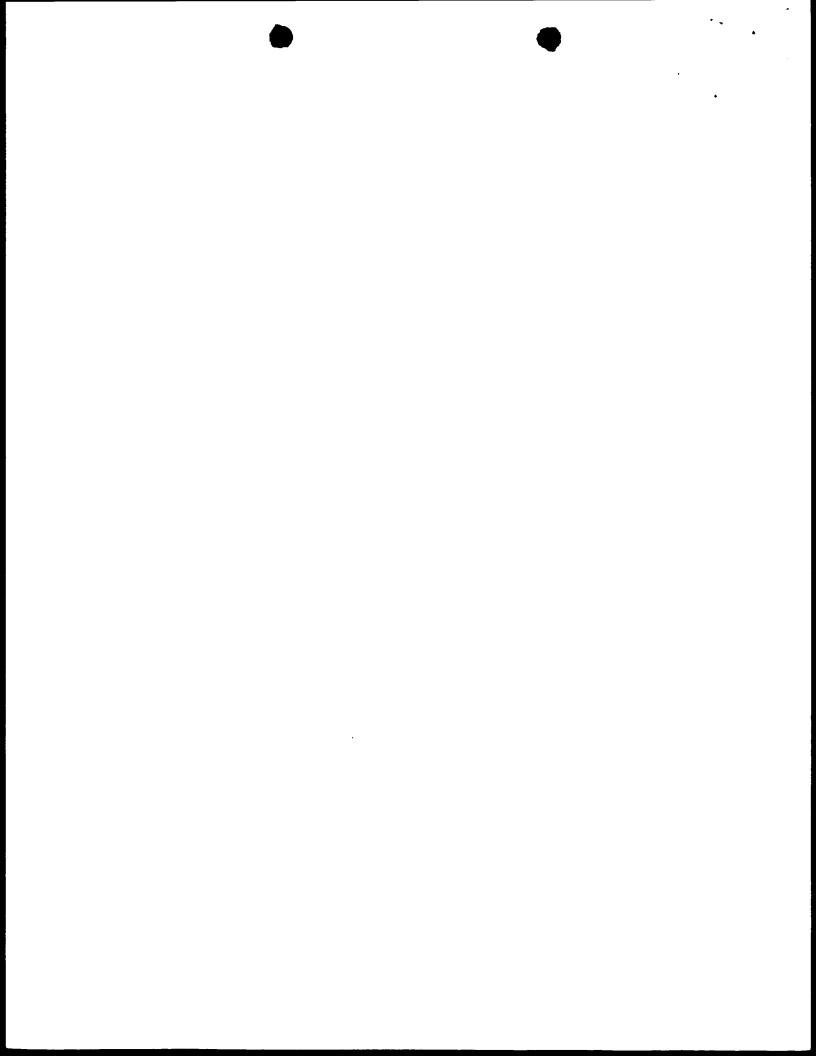


This type of heating means that essentially only a homogeneous, axial flow of heat is generated in the furnace. Such an axial flow of heat helps to reduce imperfections in the crystal (see page 567, the figure and part 2(a)).

4) The subject matter of Claims 1-13 is novel (FCT Article 33(2)), since the claimed device comprises an insulating appliance, the insulating effect of which decreases from the top heater to the bottom heater.

The problem to be solved by this feature can be considered to be that of developing a device with an extremely homogeneous, axial flow of heat.

The insulating appliance now claimed is able to substantially suppress radial fluctuations in temperature. Non-homogeneity in the heat flow can thus be considerably reduced in comparison with the device as per D1. Such an insulating appliance is not proposed either by D1 or any other cited document. Consequently, the insulating appliance is considered a non-obvious solution to the problem of interest. An inventive step (PCT Article 33(3)) is therefore acknowledged.



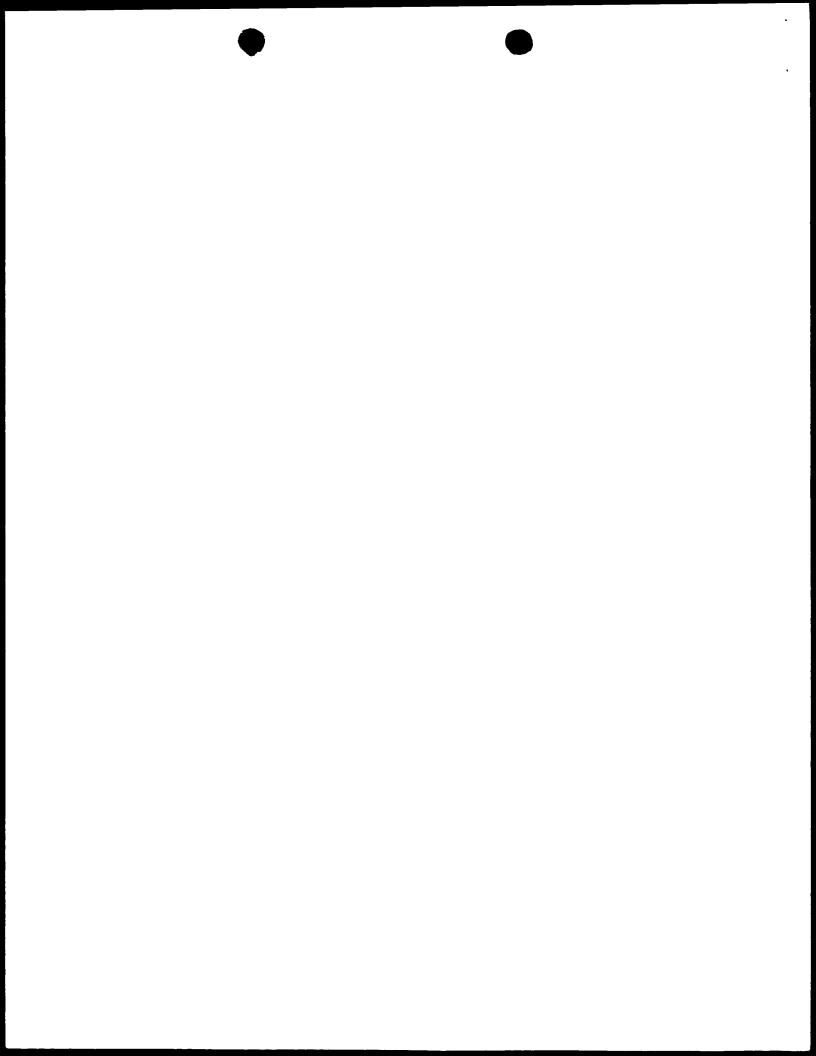
VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS** REC'D 27 MAR 2001

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICH

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

		`								
Aktenzeichen d	des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteil	ung über die Übersendung des internationalen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)						
HF 15-1424	7.2 me									
Internationales	Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Ta	g/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)						
PCT/EP00/	02349	16/03/2000		19/03/1999						
Internationale C30B11/00	Patentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und IPK								
Anmelder										
FREIBERG	ER COMPOUND MATE	RIALS GMBH et al.								
1. Dieser ir Behörde	nternationale vorläufige Prü e erstellt und wird dem Anm	fungsbericht wurde von der mit elder gemäß Artikel 36 übermit	der internatio	onalen vorläufigen Prüfung beauftragten						
2. Dieser E	BERICHT umfaßt insgesam	t 5 Blätter einschließlich dieses	Deckblatts.							
l und	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).									
Diese A	nlagen umfassen insgesam	nt 5 Blätter.								
Diese A	inagon amazzz meg									
3. Dieser E	Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:								
	☐ Grundlage des Bericht	6								
' 	☑ Grundlage des Bericht☑ Priorität	3								
"		Gutachtens über Neuheit, erfir	derische Tät	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit						
"	☐ MangeInde Einheitlichl									
V	⊠ Begründete Feststellui	ng nach Artikel 35(2) hinsichtlicl barkeit; Unterlagen und Erkläru	n der Neuheit ngen zur Stüt	, der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung						
VI	☐ Bestimmte angeführte									
VII	☐ Bestimmte Mängel der	r internationalen Anmeldung								
VIII		gen zur internationalen Anmeldi	ung							
Datum der Fi	nreichung des Antrags	Datum	der Fertigstell	ung dieses Berichts						
12/10/2000	0	23.03	2001							
	ostanschrift der mit der internati	ionalen vorläufigen Bevol	Bevollmächtigter Bediensteter							
1 ~	uftragten Behörde:			() () () () () () () () () ()						
	Europäisches Patentamt D-80298 München	Mau	ger, J							
<i>الق</i>	Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365	56 epmu d	_	CAAT						
	Fax: +49 89 2399 - 4465	Tel. N	r. +49 89 2399	844/						



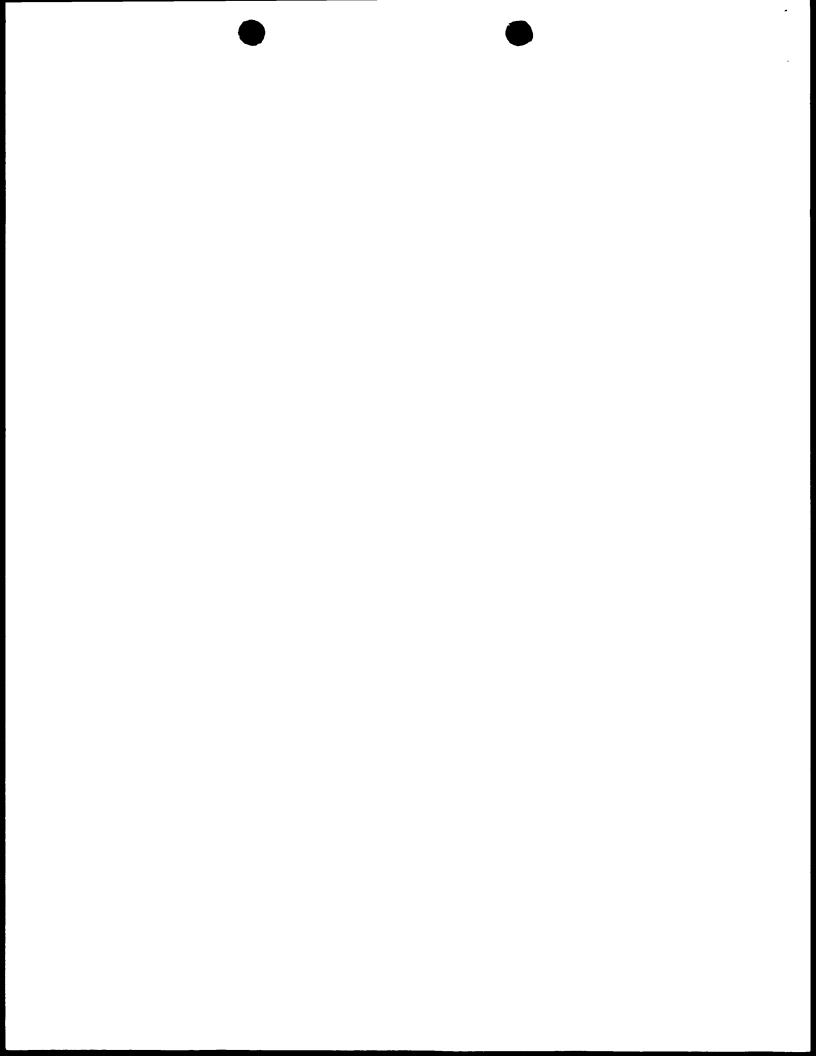
INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02349

I. Grundlage des Berichts

1.	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.)</i> : Beschreibung, Seiten:									
	1,3-	6	ursprüngliche Fassung							
	2		eingegangen am	12/03/2001	mit Schreiben vom	12/03/2001				
	Pate	entansprüche, Nr	:							
	1-10	3	eingegangen am	12/03/2001	mit Schreiben vom	12/03/2001				
	Zeid	chnungen, Blätter	:							
	1/1		ursprüngliche Fassung							
2.	die unte Die	Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um								
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	onalen Recherche eing	gereicht worden ist (nacl						
	☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).									
		die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worder ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).								
3.	Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:									
		in der internationa	alen Anmeldung in schriftlicher	Form enthalter	n ist.					
		zusammen mit de	er internationalen Anmeldung in	computerlesb	arer Form eingereicht	worden ist.				
	□ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.									
		bei der Behörde r	nachträglich in computerlesbare	er Form einger	eicht worden ist.					
		Die Erklärung, da Offenbarungsgeh	ß das nachträglich eingereichte alt der internationalen Anmeldu	e schriftliche S ung im Anmeld	equenzprotokoll nicht lezeitpunkt hinausgeht	über den t, wurde vorgelegt.				
	☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen									

Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

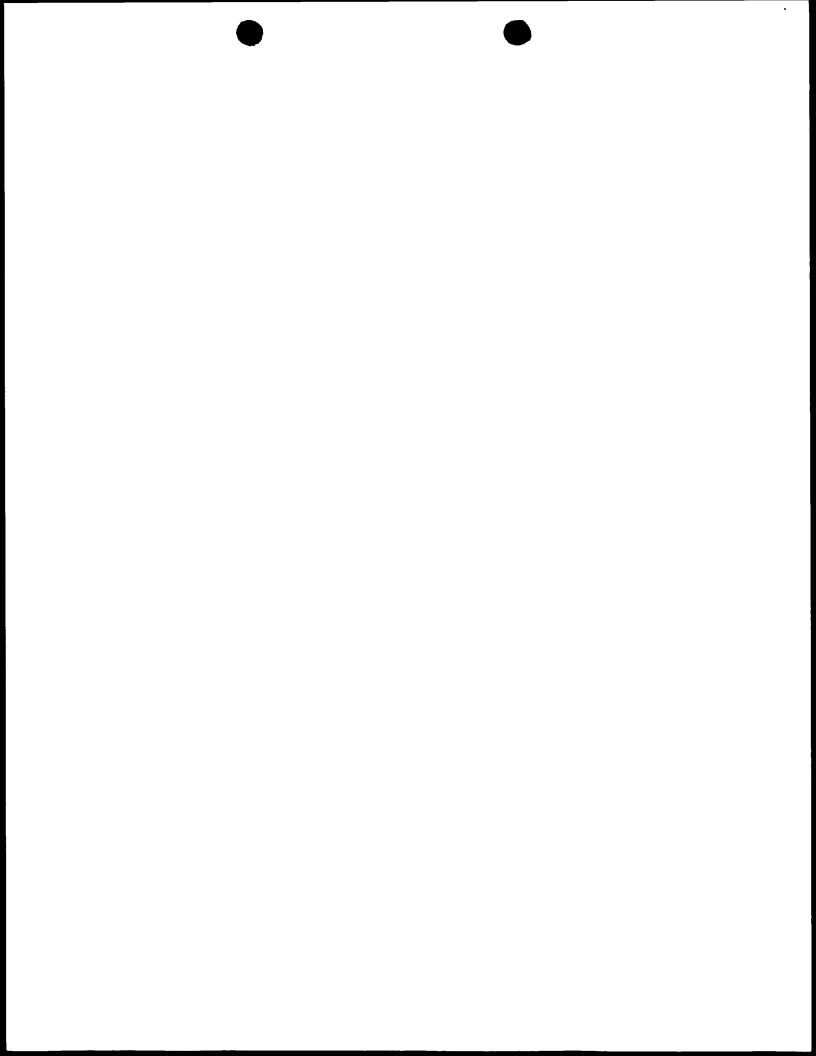


INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02349

4.	Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:											
		Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen,	Seiten: Nr.: Blatt:	•	14-18							
5.		□ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). (Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht beizufügen).										
6.	S. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:											
٧.		ründete Feststellung erblichen Anwendb									keit ur	nd dei
1.	Fest	stellung										
	Neu	heit (N)	Ja: Nei		Ansprüche Ansprüche	1-13						
	Erfir	nderische Tätigkeit (E			Ansprüche Ansprüche	1-13						
	Gev	verbliche Anwendbark			Ansprüche Ansprüche	1-13						

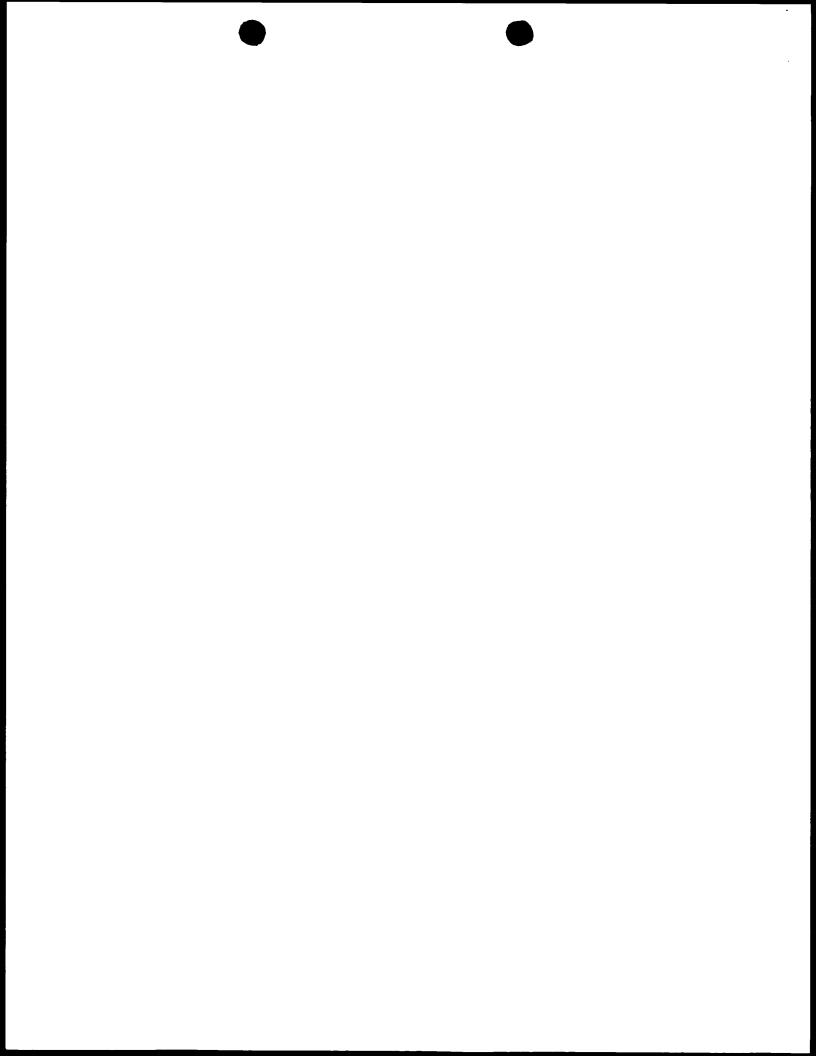
2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt



Zu Punkt V

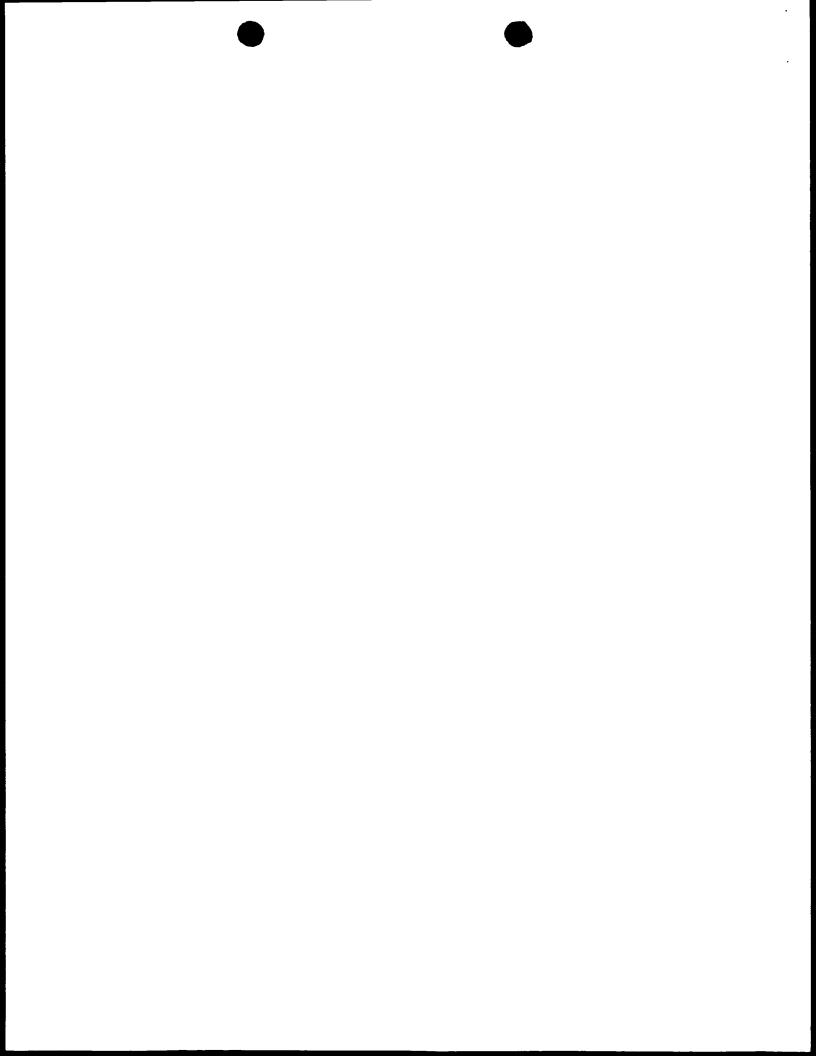
Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 1)
 - D1: ALTHAUS M ET AL: 'SOME NEW DESIGN FEATURES FOR VERTICAL BRIDGMAN FURNACES AND THE INVESTIGATION OF SMALL ANGLE GRAIN BOUNDARIES DEVELOPED DURING VB GROWTH OF GAAS' JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, NL, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, Bd. 166, Nr. 1/04, 1. September 1996 (1996-09-01), Seiten 566-571, XP000686560 ISSN: 0022-0248
- Das Dokument D1 offenbart eine Vorrichtung zur Herstellung von Einkristallen 2) insbesondere Einkristallen von GaAs. Die Vorrichtung umfaßt eine Heizeinrichtung, die als zylindrischer Ofen ausgebildet ist. Die Querschnittsfläche, des Ofens ist deutlich größer als die des Tiegels in denen das Kristall hergestellt wird. Die Heizeinrichtung ist unterteilt in einen Bodenheizer, einen Deckelheizer und eine Mantelheizung.
 - Der Deckelheizer wird während des Kristallwachstums auf eine konstante Temperatur oberhalb des Schmelzpunktes gehalten. Die Temperatur des Bodenheizers hingegen wird kontinuierlich reduziert. Hierdurch wird erreicht, daß eine Kristallisationsfront nach oben steigt.
 - Diese Art der Heizung hat zur Folge, daß im wesentlichen nur ein homogener axialer Wärmefluß im Ofen erzeugt wird. Ein solcher axialer Wärmefluß trägt bei zur Vermeidung von Fehlern im Kristall (siehe Seite 567, Figur und Teil 2(a)).
- Der Gegenstand der Ansprüche 1-13 ist neu (Artikel 33(2) PCT), weil die 4) beanspruchte Vorrichtung eine Isolatoreinrichtung umfaßt, die derart ausgebildet ist, daß sie eine von dem Deckelheizer zu dem Bodenheizer abnehmende Isolationswirkung aufweist.
 - Die Aufgabe, die durch dieses Merkmal gelöst werden soll, kann in der Bereitstellung einer Vorrichtung mit einem sehr homogenen axialen Wärmefluß



gesehen werden.

Die jetzt beanspruchte Isolatoreinrichtung ist in der Lage radialen Temperaturunterschieden sehr stark zu unterdrucken. Somit können Inhomogenitäten im Wärmefluß im Vergleich zu der Vorrichtung von D1 deutlich reduziert werden. Eine solche Isolatoreinrichtung wird weder in Dokument D1 noch in irgendeine der weiteren zitierten Dokumente vorgeschlagen. Die Isolatoreinrichtung wird somit als nicht naheliegende Lösung der Aufgabe angesehen. Eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 33(3) PCT wird daher anerkannt.



freiberger Compound Mate-

<...>

PCT/EP00/02349

Lister dem Junal of Crystal Crowflow, North-Hoxand Publishing Co. Amsterdam, Bd. 166, Nr. 1104, 1. September 1996, Seiten 866-571, ist eine Vorriortung nach dem Oberbejieff des Auspreules 1 bekannt.)

Derartige Vorrichtungen sind jedoch sowohl durch einen axialen als auch durch einen radialen Wärmefluß gekennzeichnet, was zu einer variablen Wachstumsgeschwindigkeit und einer ungünstigen Ausbildung der Phasengrenzfläche Schmelze-Kristall führen kann.

Desweiteren sind Mehr- bzw. Vielzonenöfen aus einer Vielzahl thermischer Bauelemente zusammengesetzt, was bei Wartungsarbeiten einen hohen Demontage- und Montageaufwand erfordert. Mit steigender Zonenzahl erhöht sich auch der Automatisierungsaufwand und die Störungsanfälligkeit der Mehrzonenöfen.

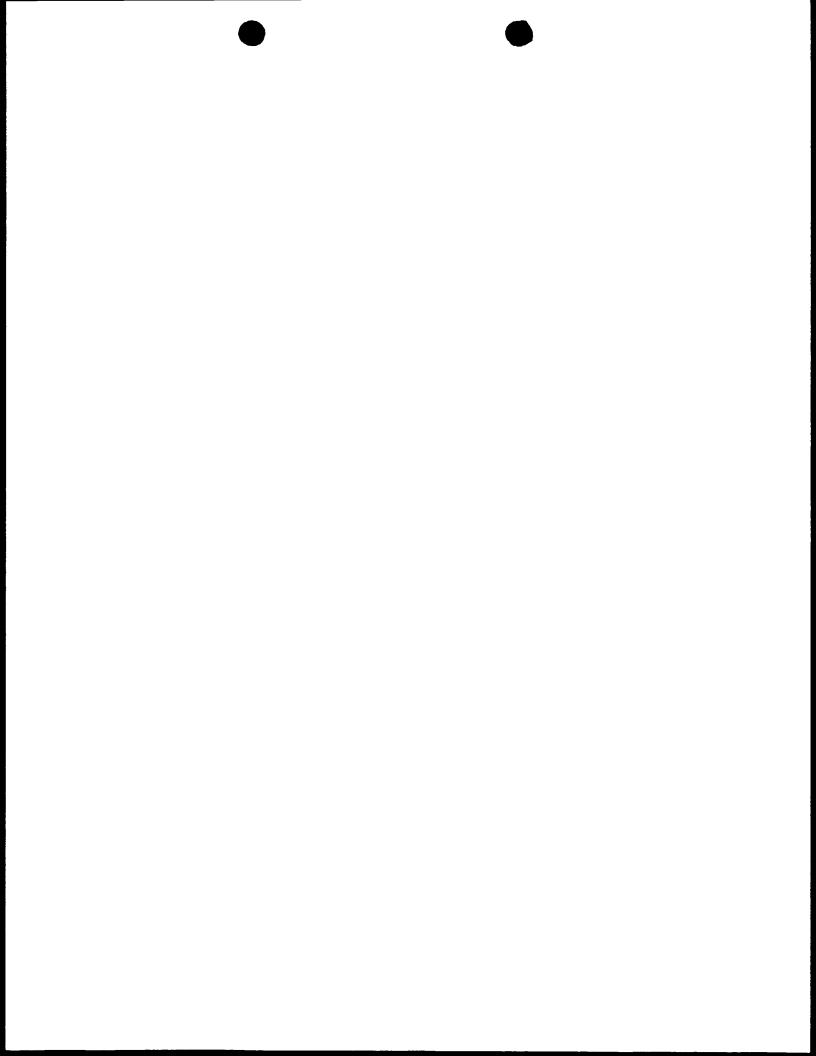
Insbesondere für die Herstellung von Einkristallen mit einem großen Durchmesser, beispielsweise 2", 3", 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm und größer, besteht das Problem, daß ein radialer Wärmefluß im Kristall eine Auswirkung auf die Isothermen, d.h. auf die Phasengrenze Schmelze-Einkristall in vertikaler bzw. axialer Richtung hat.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur Herstellung von Einkristallen, insbesondere von Einkristallen unterschiedlicher III-V-Materialien, beispielsweise von Galliumarsenid, bereitzustellen, bei der eine fast ausschließlich axiale Wärmeführung gewährleistet ist.

Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung nach Anspruch 1.

Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Die Vorrichtung hat den Vorteil, daß ein homogener axialer Wärmefluß gewährleistet ist und daß in radialer Richtung nahezu keine Wärme abfließen kann, d.h. einer radial homogenen Temperatur an der oberen und unteren Heizplatte und den dazwischenliegenden Schnitten.



PCT/EF EP 000002349

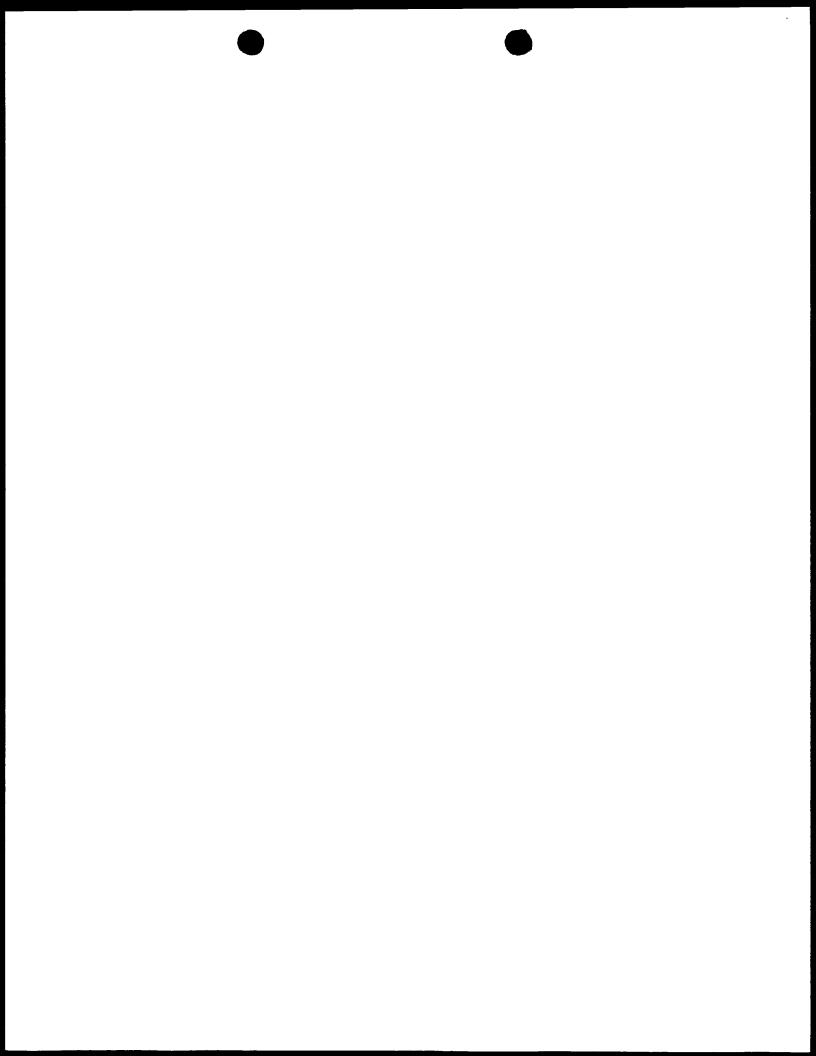
1 Norrichtung zur Herstellung eines Einkristalls durch Züchtung aus einer Schmelze von Rohmaterial des herzustellenden Einkristalls,

mit einer Heizeinrichtung (1) zum Erzeugen eines Temperaturgradienten innerhalb der Schmelze aus Rohmaterial, wober dadurch gekennzeichnet, daß die Heizeinrichtung (1) einen rotationssymmetrischen Ofen (1) mit einer Rotationsachse (M) und mit einem im wesentlichen ebenen Bodenheizer (2) einem im wesentlichen ebenen Deckelheizer (3) aufweist, die auf unter-schiedliche Temperaturen steuerbar sind und daß eine Isolatoreinrichtung vorgesehen ist, die derart ausgebildet ist, daß ein Wärmefluß in einer radialen Richtung senkrecht zur Rotationsachse (M) des Ofens (1) auf ein vorbestimmtes Maß begrenzbar ist, send nober

14. Vorrichtung nach Anspruch 13 dadurch gekennzeichnet, daß die Isolatoreinrichtung (6) derart ausgebildet ist, daß sie eine von dem Deckelheizer (3) zu dem Bodenheizer (2) abnehmende Isolationswirkung aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Ofen zylindrisch ausgebildet ist und daß eine Steuereinrichtung vorgesehen ist, die so ausgebildet ist, daß die Temperatur des Bodenheizers (2) im Vergleich zur Temperatur des Deckelheizers (3) absenkbar ist.

Vorrichtung nach binem der Ansprüch gekennzeichnet, daß die Isolatoreinrichtung (6) als kegelstumpfförmiger Körper mit einem koaxialen zylindrischen und oben und unten offenen Hohlraum ausgebildet ist, der so in dem Ofen (1) angeordnet ist, daß sein jüngeres Ende den Bodenheizer (2) zugewandt ist.



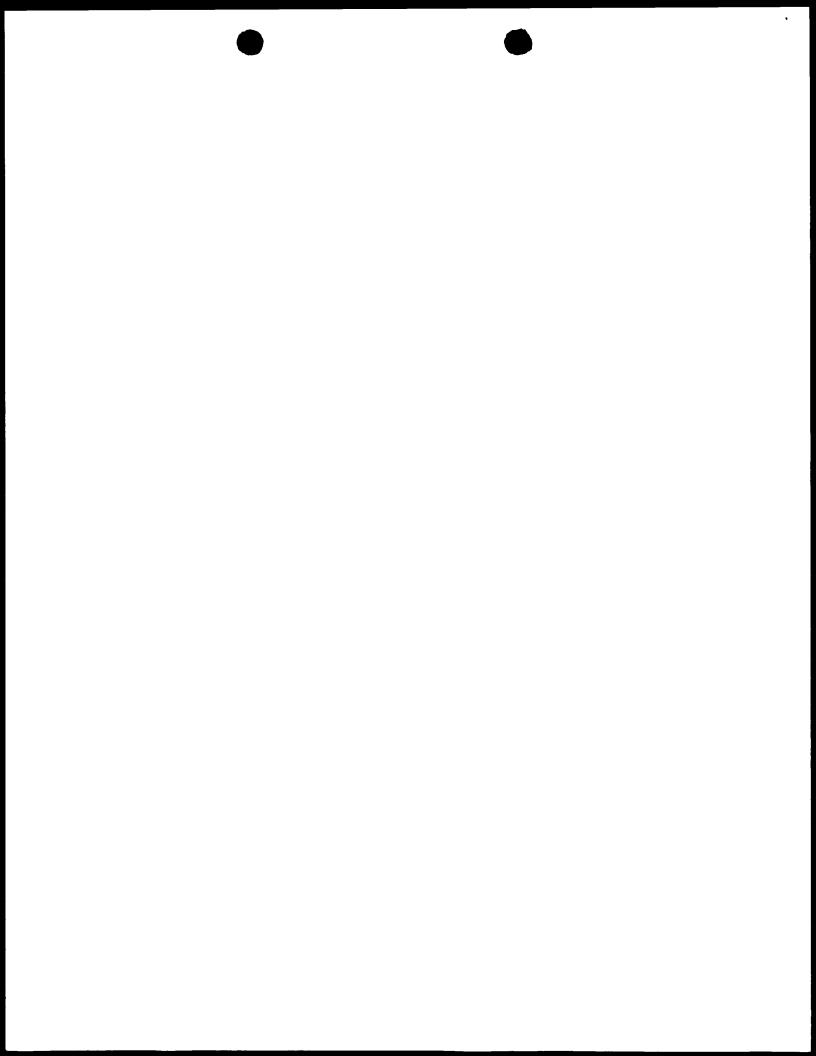
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Ofen (1) eine Mantelheizung (5) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 bis A, dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmeübertragungsteil (6) eine beliebige rotationssymmetrische profilierte bzw. unprofilierte Form besitzer Kanf.

vorrichtung pur Herstellung eines Einkristalle durch Züchtung aus einer Schmelze von Rohmaterial des herzustellenden Einkristalls, mit einer Heizeinrichtung (1) zum Erzeugen eines Temperaturgradienten innerhalb der Schmelze aus Rohmaterial, dadurch gekennzeichnet, das die Heizeinrichtung (1) einen ersten im wesentlichen ebenen hochwärmeleitfähigen Heizer (2) und parallel zu diesem und in einem Abstand dazu angeordneten zweiter im wesentlichen ebenen hochwärmeleitfähigen Heizer (3) iche Temperaturen steuerbar sind red Heizflächevim Verhältnis zu dem Durchmesser des herzustellenden Einkristalls so bemessen ist, daß ein über die radiale Querschnittsfläche des herzustellen Einkristalls im wesentlichen homogene Temperatur und zwischen dem ersten Heizer (2) und dem zweiten Heizer (3) im wesentlichen ein homogener konstanter Temperaturgradient erzeugbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch H, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der Fläche jedes Heizers (2,3) wenigstens das 1,5-fache der Querschnittsfläche des herzustellenden Einkristalls beträgt.

Vorrichtung nach Ansprüch Aber 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine Steuerung vorgesehen ist, die so ausgebildet ist, daß die Temperatur des ersten ebenen Heizers (2) gegenüber dem zweiten ebenen Heizer (3) kontinuierlich absenkbar ist.



- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis &, dadurch gekennzeichnet, daß Aie Heizeinrichtung als zylindrischer-Ofen
 - (1) ausgebildet ist wobei der erste Heizer als Bodenheizer
- (2) und der zweite Heizer als Deckelheizer (3) ausgebildet ist, webei der Abstand zueinander größer als die Länge des herzustellenden Einkristalls ist.

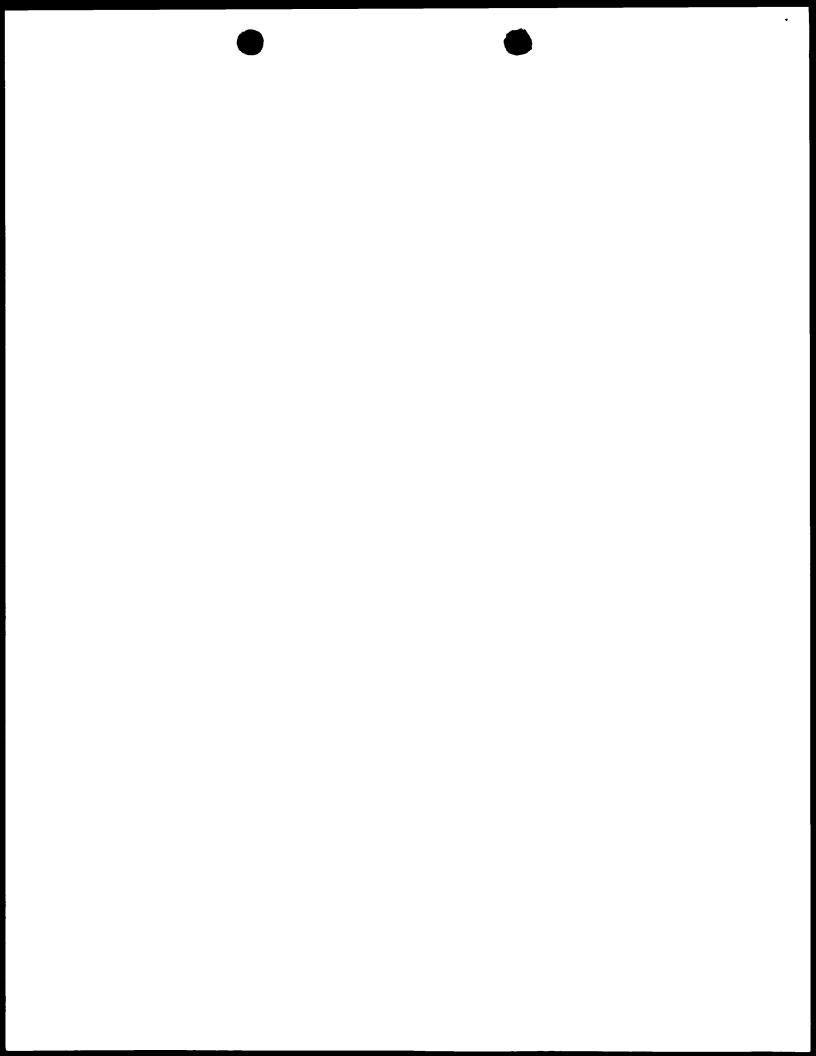
Norrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17 dadurch gekennzeichnet, daß der von den Heizern (2, 3) eingeschlossene Raum von einer diesen Raum umgebenden Mantelheizung (5) umsehlossen ist

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, gekennzeichnet durch eine Isolatoreinrichtung (6), die derart ausgebildet ist, daß ein Wärmefluß in einer radialen Richtung senkrecht zur Zylinderachse (M) des Ofens (1) begrenzt wird

(. Vorrichtung nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnee, daß die Isolatoreinrichtung (6) derart ausgebildet ist, daß sie eine von dem Deckelheizer (3) zu dem Bodenheizer (2) abnehmende Isolationswirkung aufweist/.

Norrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolatoreinrichtung (6) als kegelstumpfförmiger Körper mit einem koaxialen zylindrischen und oben und unten offenen Hohlraum ausgebildet ist, der so in dem Ofen (1) angeordnet ist, daß sein jüngeres Ende den Bodenheizer zugewandt

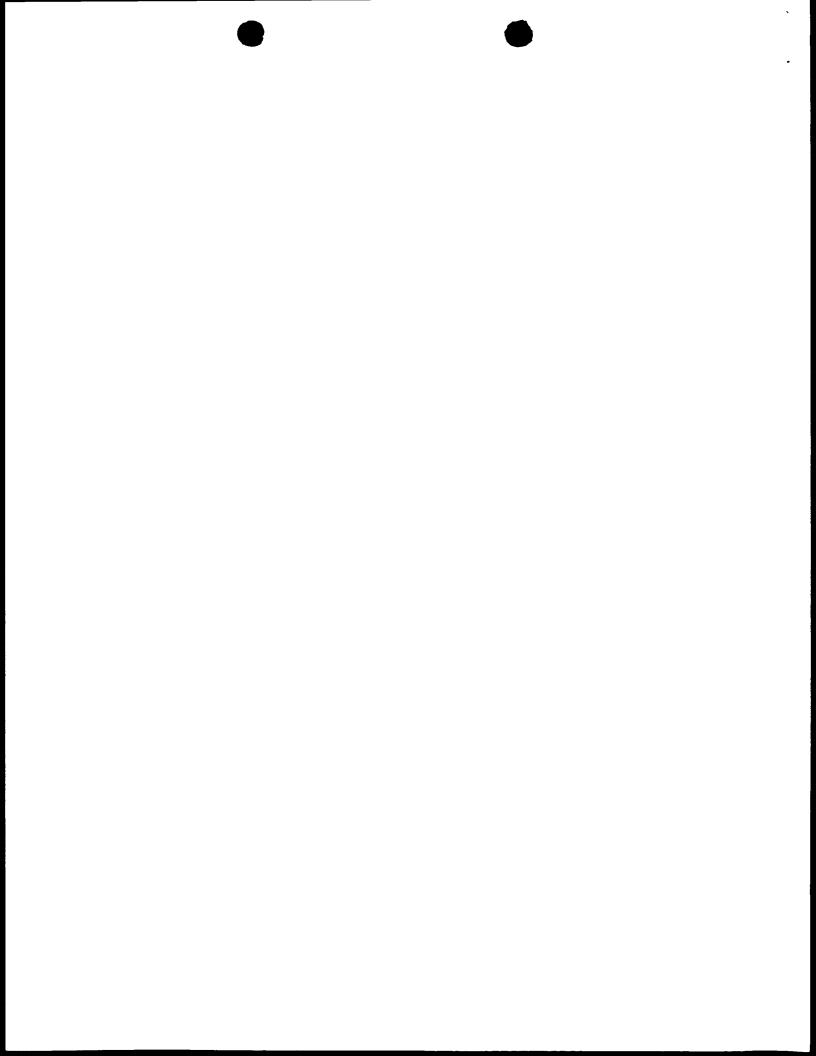
10
19: Vorrichtung nach einem der Ansprüche # bis #, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolatoreinrichtung z.B. aus Graphit gebildet ist.



Ye. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis A. dadurch gekennzeichnet, daß ein Tiegel (4) zur Aufnahme einer Schmelze
an Rohmaterial des herzustellenden Einkristalls vorgesehen
ist, der zwischen dem ersten Heizer (2) und dem zweiten Heizer (3) angeordnet ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung eine Vorrichtung zur Herstellung eines Einkristalls aus einem III-V-Verbundhalbleiter ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis XX, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung eine Vorrichtung zum Herstellen eines Einkristalls aus Galliumarsenid ist.



However, devices of this kind are characterized not only by an axial but also by a radial heat flow that can lead to a variable growth rate and to an unfavorable formation of the interphase melt-crystal.

In addition, multizone or multiple temperature zone furnaces are composed of a variety of thermal construction elements and this requires considerable expense for dismantling and assembling for maintenance work. As the number of zones increases the amount of automation increases and with it the susceptibility to faults of multizone furnaces.

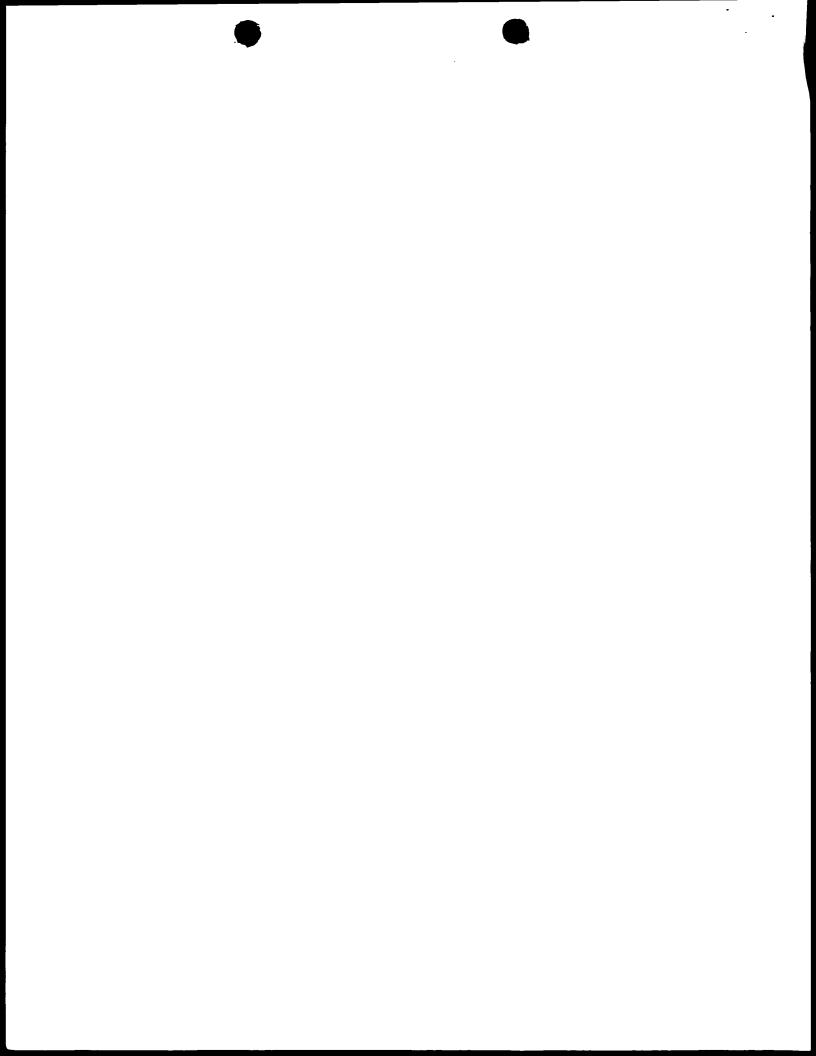
In particular for the production of monocrystals with a large diameter, for example 2", 3", 100 mm, 125 mm, 150 mm 200 mm and above, there is the problem that a radial heat flow in the crystal has an effect on the isotherms, i.e. on the interphase melt-monocrystal in a vertical or axial direction respectively.

The task of the invention is to provide a device for producing monocrystals, in particular monocrystals of various III-V materials, for example from gallium arsenide, in which the heat control is almost exclusively axial.

The task is solved by means of a device in accordance with Claim 1.

Further developments are indicated in the subordinate claims.

The device has the advantage that a homogeneous axial heat flow is guaranteed and that practically no heat at all can run off in a radial direction, i.e. of a radially homogene.

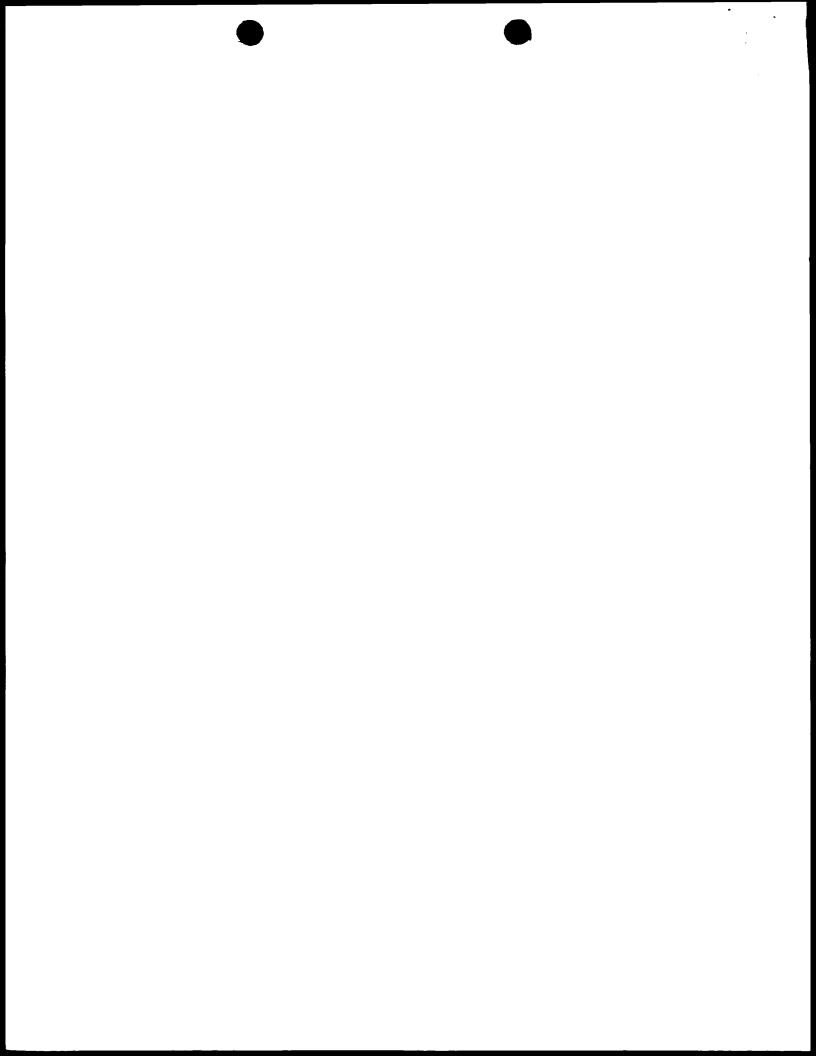


PATENT CLAIMS

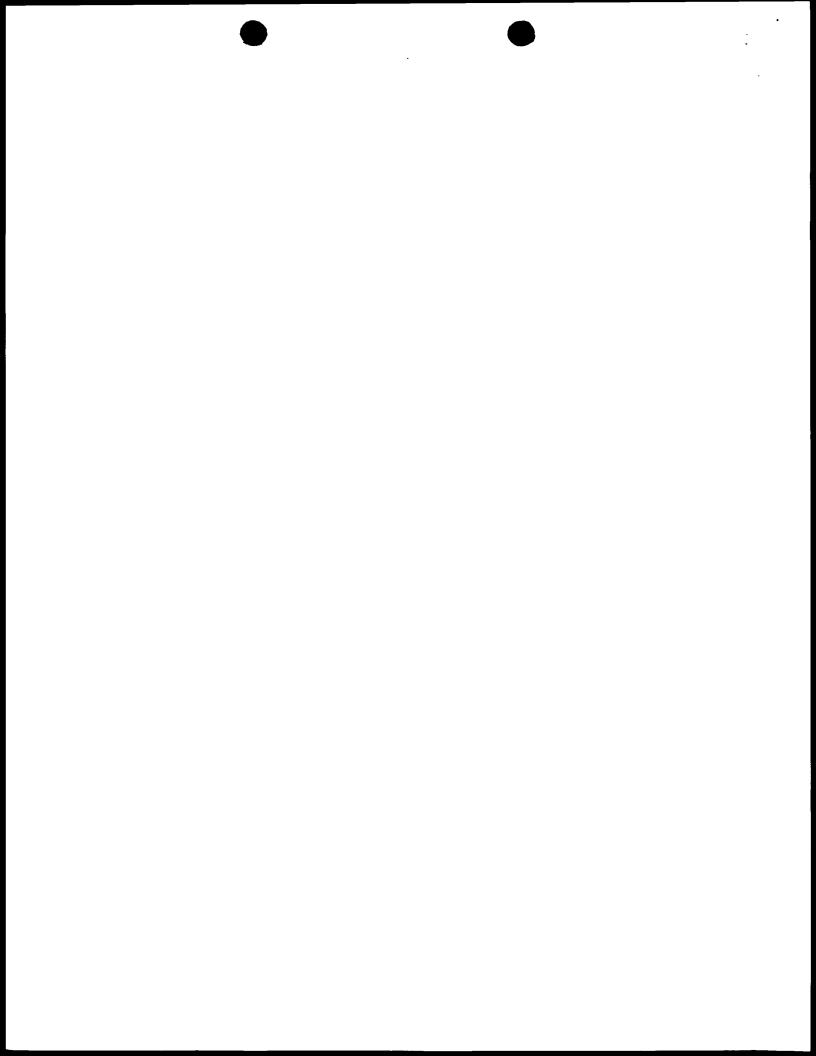
1. Device for producing a monocrystal through growing from a melt of raw material of the monocrystal that is to be produced

with a heating appliance (1) to generate a temperature gradient within the raw material melt characterized in such a way that the heating appliance (1) has a first essentially level high-temperature conducting heater (2) and parallel to this and located at distance from this a second essentially level high-temperature conducting heater (3) that can be controlled to different temperatures and whose heating surface in a ratio to the diameter of the monocrystal to be produced is calculated so that a temperature that is essentially homogeneous over the radial cross-section surface of the monocrystal to be produced can be generated together with a temperature gradient between the first heater (2) and the second heater (3) that is essentially homogeneous and constant.

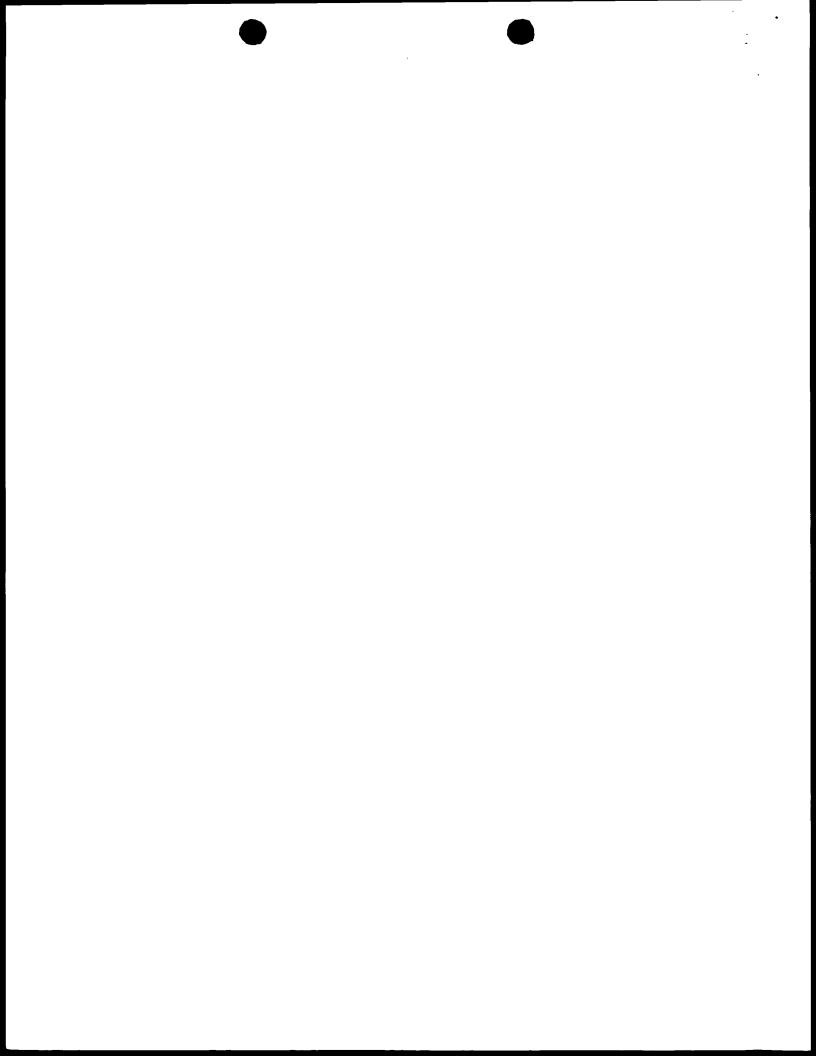
- 2. A device in accordance with Claim 1 characterized by the size of the surface of each heater (2, 3) being at least 1.5 times the cross-sectional area of the monocrystal to be produced.
- 3. A device in accordance with Claims 1 or 2 characterized by a controller being planned that is designed so that the temperature of the first level heater (2) can be lowered continuously as against the second level heater (3)
- 4. A device in accordance with Claims 1 to 3 characterized by a heating appliance that is designed as a cylindrical furnace (1) whereby the first heater is designed as a floor heater (2) and the second heater as a cover heater (3) whereby the clearance between the two is greater than the length of the monocrystal to be produced.



- 5. A device in accordance with Claims 1 to 4 characterized by the space enclosed by the heaters (2, 3) being enclosed by a jacket heater that surrounds this space.
- 6. A device in accordance with Claims 4 or 5 characterized by an insulator device (6) that is designed in such a way that a heat flow in a radial direction vertical to the cylinder axis (M) of the furnace is restricted.
- 7. A device in accordance with Claim 6 characterized by the insulator device (6) being designed in such a way that it has a decreasing insulating effect from the cover heater (3) to the floor heater (2).
- 8. A device in accordance with Claims 6 or 7 characterized by the insulator device (6) being designed as a tapered cone body with a coaxial cylindrical hollow space that is open at the top and bottom and placed in the furnace (1) in such a way that the tapered end is towards the floor heater.
- 9. A device in accordance with Claims 6 to 8 characterized by the insulator device being made, for example, of graphite.
- 10. A device in accordance with Claims 1 to 9 characterized by the inclusion of a crucible (4) for holding a melt of raw material of the monocrystal to be produced that is located between the first heater (2) and the second heater (3).



- 11. A device in accordance with Claims 1 to 10 characterized by the device being a device for producing a monocrystal from a III-V composite semiconductor.
- 12. A device in accordance with Claims 1 to 11 characterized by the device being a device for producing a monocrystal from gallium arsenide.
- 13. Device for producing a monocrystal by growing from a melt of raw material of the monocrystal to be produced with a heating appliance (1) for generating a temperature gradient within the melt of raw material characterized in such a way that the heating appliance (1) has a rotationally symmetrical furnace (1) with a rotation axis (M) and with an essentially level floor heater (2) and an essentially level cover heater (3) that can be controlled to different temperatures and that an insulating device being planned that is designed in such a way that that a heat flow in a radial direction vertical to the rotation axis (M) of the furnace (1) can be restricted to a preset rate.
- 14. Device in accordance with Claim 13 characterized by the insulating device (6) being designed in such a way that its insulating effect is reduced from the cover heater (3) to the floor heater (2).
- 15. Device in accordance with Claim 13 or 14 characterized by the furnace being designed cylindrically and by there being a controller that is designed in such a way that the temperature of the floor heater (2) can be reduced in comparison with the temperature of the cover heater.



- 16. Device in accordance with one of the Claims 13 to 15 characterized by the insulator device (6) being designed as a tapered cone body with a coaxial cylindrical hollow space that is open at the top and bottom and placed in the furnace (1) in such a way that the tapered end is towards the floor heater (2).
- 17. Device in accordance with on of the Claims 13 to 16 characterized by the furnace (1) having a jacket heater (5).
- 18. Device in accordance with Claims 1 to 17 characterized by the heat transmission part (6) being able to have any type of rotationally symmetric profiled or unprofaned shape.

